

令和5年度  
事業概要報告書

京都府中小企業技術センター

<https://www.kptc.jp/>



# 目 次

当センターの概要	
1 所在地及び施設等	1
2 組織図	2
3 人員構成	2
4 令和5年度の利用状況等の概要	3
I 中期事業計画の重点取組の推進	
1 重点目標	4
2 取り組みのコンセプト	4
3 取り組みの内容	4
II 技術支援	
1 技術相談	5
2 依頼試験	8
3 機器貸付	11
4 企業訪問による現地現場対応(中小企業技術応援隊)	12
5 企業への助成・表彰等に係る技術審査	12
6 府施策と連携した技術的対応	12
7 地域技術相談会の開催(中小企業技術応援隊)	13
8 出張技術相談会の開催(中小企業技術応援隊)	13
III 人材育成	
1 研究会、セミナー・講習会の開催	14
2 研究生・実習生の受け入れ	17
3 中小企業への啓発等	18
IV 研究開発	
1 所内研究、共同研究	20
2 受託研究	21
3 研究課題評価	21
4 知的財産の活用	21
5 企業との協働による具体的な技術開発の推進	22
6 研究発表・出講	23
V 関係機関との連携	
1 広域での公設試験研究機関の連携	24
2 産業支援機関との連携	24
3 大学との連携	24
4 業界団体等との連携	24

VI	情報発信	
1	中小企業等への情報提供の強化と、広く府民の皆さんへの広報	25
2	施設の公開	25
3	ニーズの変化に対応した情報の提供	26
VII	地域産業の活性化	
1	北部地域ものづくり産業振興	27
2	けいはんな地域における大学・研究機関と企業との連携推進	28
VIII	技術支援体制の充実・強化	
1	技術職員の資質向上	29
2	機器利用者への支援体制強化	29
3	知的財産の管理	29
4	機器の整備	29
5	業務運営に係る基盤的事項	30
	(参考)	
	審査会等への出席一覧	31
	研究会、セミナー・講習会等実績	33
	依頼試験手数料、機械器具貸付料の特例措置について	38
	依頼試験の項目一覧	39
	ご利用いただける機器一覧	43
	館内案内	58
	沿革	59

# 当センターの概要

---

## 1 所在地及び施設等

### (1) 本所

- 所在地 京都府京都市下京区中堂寺南町 134  
(七本松通五条下ル 京都リサーチパーク内)
- 土地 1,380 m<sup>2</sup>
- 建物 7,296 m<sup>2</sup> (延床面積) (平成元年 8 月竣工、平成 13 年 12 月増築)
  - ・本館 6,175 m<sup>2</sup> 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上5階、地下1階 (2階を除く)
  - ・研究交流棟 1,121 m<sup>2</sup> 鉄骨・鉄筋コンクリート造 2階建のうちの1階部分
- 設備・機器 約 200 機種 (100 万円以上の機器)

### (2) 中丹技術支援室

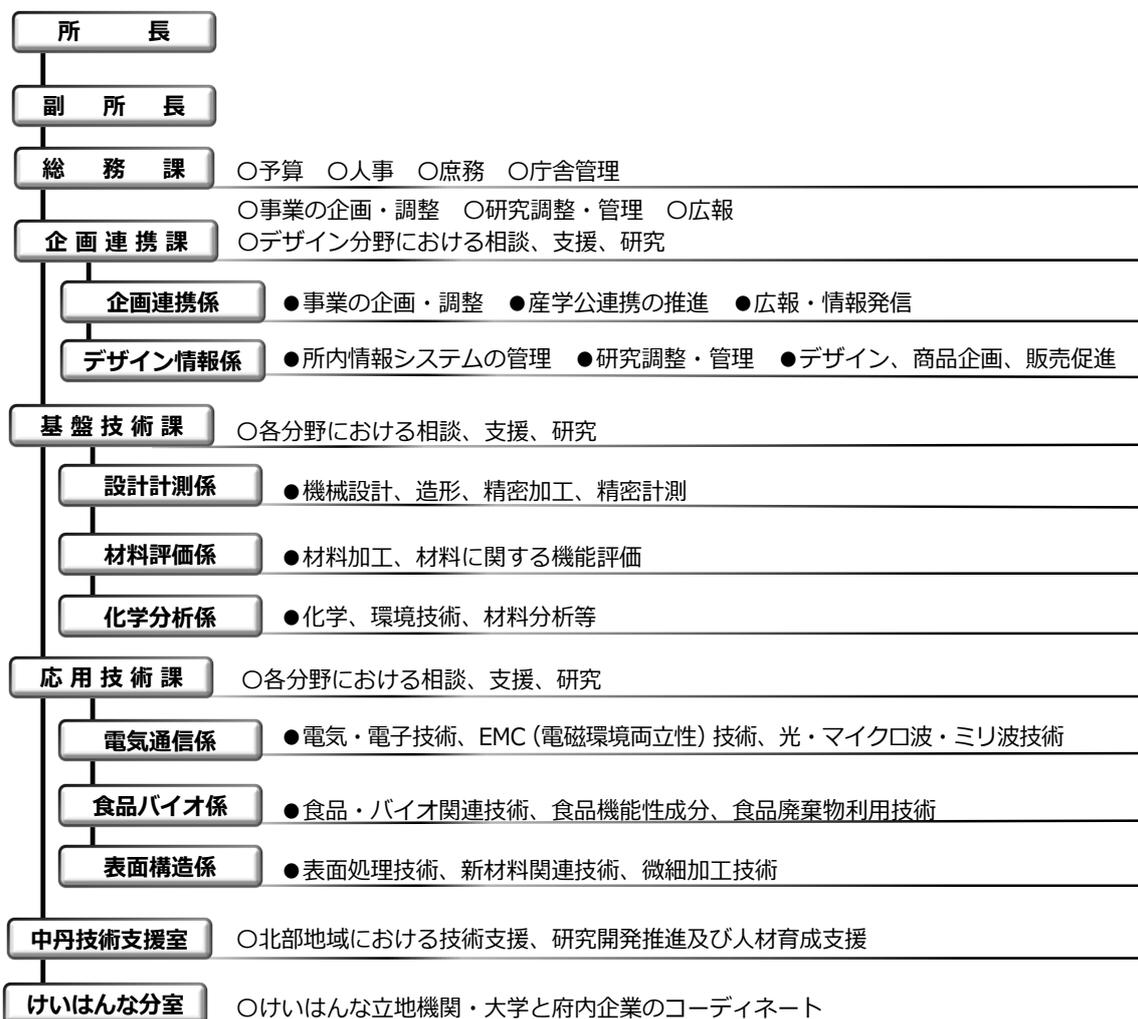
- 所在地 京都府綾部市青野町西馬場下33-1  
(北部産業創造センター内)
- 建物 1,472m<sup>2</sup> (鉄骨造 2階建)
- 設備・機器 約100機種

### (3) けいはんな分室

- 所在地 京都府木津川市木津川台 9 丁目 6 / 相楽郡精華町精華台 7 丁目 5  
関西文化学術研究都市 (京都府精華・西木津地区)  
(けいはんなオープンイノベーションセンター (KICK) 内)

(令和 6 年 3 月 31 日現在)

## 2 組織図



## 3 人員構成

	人 数		
	事 務	技 術	技能労務
所 長	1	1	
副 所 長	1		
総 務 課	5		1
企画連携課	10	8	
基盤技術課	9	9	
応用技術課	12	12	
中丹技術支援室	4	4	
けいはんな分室	1		
計	43	34	1

注: 会計任用職員を除く。

(令和 6 年 3 月 31 日現在)

## 4 令和5年度の利用状況等の概要

### (1) 数値目標と実績

	項 目	目 標	実 績	達成率
技術支援	◇技術相談・指導件数	2,000 件	2,174 件	109%
	◇機器貸付件数	3,100 件	3,147 件	102%
	◇依頼試験(種目)件数	1,450 件	1,469 件	101%
	◇企業訪問件数	450 社	398 社	88%
人材育成	◇研究会・セミナー開催回数	195 回	220 回	113%
	◇研究会・セミナー参加人数 <sup>(注1)</sup>	5,000 人	4,724 人	94%
研究開発	◇研究調査(所内・共同・受託)件数 <sup>(注2)</sup>	15 件	13 件	87%
情報発信	◇ホームページ閲覧件数	(注3) 280,000PV	267,314PV	95%
中期計画	◇外部資金獲得申請件数	4 件	1 件	25%

(注1) Web 参加・視聴を含む。

(注2) 研究芽出し(課題解決)を含む。

(注3) PV(ページビュー) : ページが開かれた回数。

### (2) その他実績

	内 容	実 績	備 考
技術支援	特別技術指導、ハイテク技術巡回指導	6 件	特別技術指導員等による指導
人材育成	研究生等の受け入れ・延べ人数	151 人	
研究開発	委託研究	0 件	
情報発信	情報誌「クリエイティブ京都M&T」	6,000 部×4 回	四半期毎

# I 中期事業計画の重点取組の推進

---

当センターが「頼られるセンター」であることを目指し策定した「第4期中期事業計画」(事業期間:令和3年度～令和5年度)において3つの重点目標を達成するため事業を推進した。

## 1 重点目標

### (1) 職員力の向上

「頼られるセンター」であるための至上命題。技術継承・資質向上、研究活動の促進、課や係の枠を超えた企業支援の強化などを含めた総合的な職員力を向上させます。

### (2) 現場主義の徹底

企業や業界のニーズに対応するために不可欠で、職員力の向上にもつながる重要な命題。企業訪問の促進、業界団体や関係機関等との連携強化など、現場主義を徹底します。

### (3) 即応性の強化

社会情勢や環境の変化、災害等の突発的な課題に対応するために必要な命題。状況に即して迅速かつ柔軟に対応できる組織となるため、即応性を強化します。

## 2 取り組みのコンセプト

「待ちの組織から導ける組織へ ～企業ニーズに即したソリューションを提供します～」

## 3 取り組みの内容

企業や業界の直面する技術課題やセンターに求められているものを調査等により把握し、どのような解決策を提供できるかを軸に分析を行い、導かれた解決策を事業立案・推進を経て、業務へ反映させることにより、企業や業界への支援を行う業務サイクルを確立することを目指した。

また、「課題発見・分析、事業立案・推進」のサイクルを職員の実践を通して定着、向上させることによって、突発的な課題に対しても迅速かつ柔軟に対応できる組織としての即応性の強化を図った。

令和5年度は事業を推進するため令和3年度に立ち上げた4つの第4期中期事業計画推進プロジェクトチームにより、引き続き具体的な事業推進に取り組んだ。

## II 技術支援

急速な産業構造変化の中で、中小企業が自らの「強み」を再認識し、これを活かして力強く活動できるよう、自社だけでは対応が困難な技術開発等に関する支援を行うとともに、各種固有技術の相談や技術的裏付けを取る依頼試験、機器貸付による開発支援、企業等の要請に応じた技術支援を行った。

### 1 技術相談

#### (1) 一般技術相談

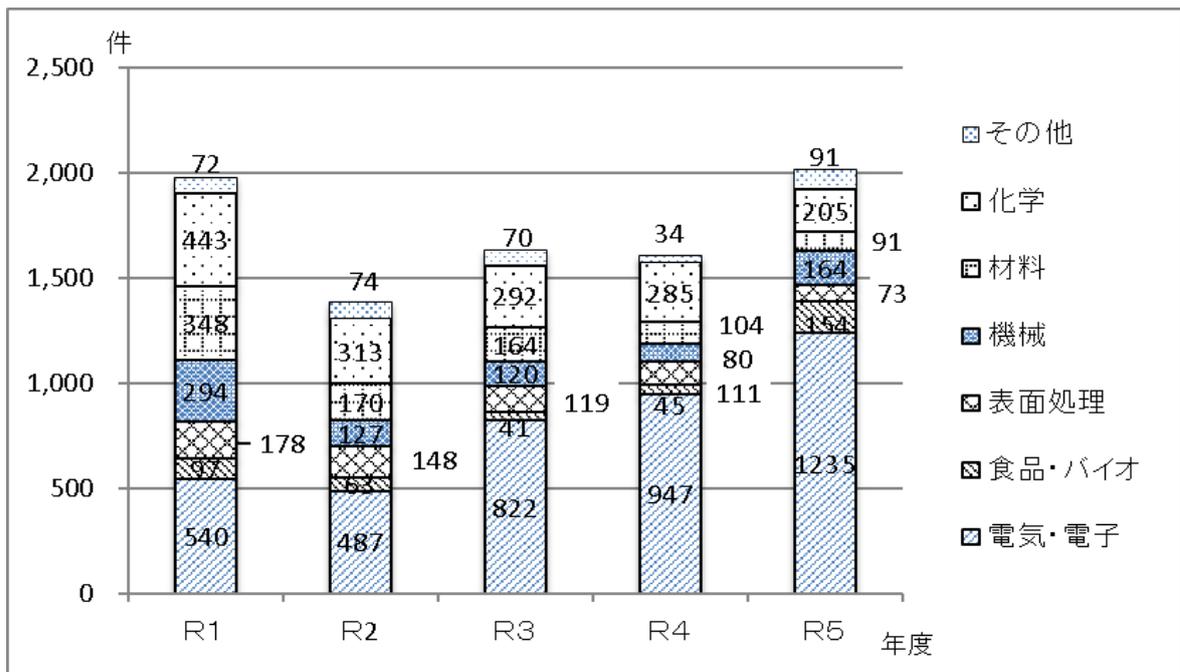
製品開発、品質管理、基礎的技術、実験手法等、中小企業が抱える技術に関する様々な悩みや課題について、当センター職員によるアドバイス及び情報提供等を行った。

令和5年度の技術相談・指導件数、分野別主要技術相談件数は、表1、2及び図1のとおりである。

表1 技術相談件数

内 容	実 績	
技 術 相 談 ・ 指 導	2,174 件	
うち 主 要 技 術 相 談	2,013 件	分析、試験、測定、評価 ほか
うち 簡 易 技 術 相 談	161 件	

図1 主要技術相談件数



注:簡易技術相談及びハイテク技術巡回指導を除く。

表2 分野別主要技術相談件数

分野 \ 年度	R1	R2	R3	R4	R5
電気・電子	540	487	822	947	1,235
食品・バイオ	97	63	41	45	154
表面処理	178	148	119	111	73
機械	294	127	120	80	164
材料	348	170	164	104	91
環境	2	4	6	1	1
化学	443	313	292	285	205
その他	70	70	64	33	90
総計	1,972	1,382	1,628	1,606	2,013

## (2) 現地技術相談（中小企業技術応援隊）

中小企業の新製品開発、品質管理、技術改善、研究開発等の技術課題について、当センター職員（中小企業技術応援隊）が現地に赴き、アドバイスをを行った。

現地技術相談件数	3件
----------	----

## (3) インターネットによる技術相談

中小企業の多様化する諸問題に迅速かつ的確に対応するため、メールでの相談を受け付け、対応した。

## (4) 外部専門家等と当センター職員による指導（ハイテク技術巡回指導事業）

中小企業が創造的・先駆的な技術開発や製品開発等に取り組む中で起こる様々な技術的課題を解決するために、京都府中小企業特別技術指導員（表3）や大学教授等の専門家とセンター職員により、助言・指導を行った。

特別技術指導員等による指導	6件
---------------	----

**表3 京都府中小企業特別技術指導員（31名）一覧**

（順不同、敬称略、所属は依頼時）

No.	専門分野	氏名	所属
1	レーザー物理学	山下 幹雄	北海道大学 名誉教授
2	応用光学、光工学	栗辻 安浩	京都工芸繊維大学大学院 電気電子工学系 教授
3	光センシング	的場 修	神戸大学 次世代光散乱イメージング科学研究センター 教授
4	電気・電子(実装技術)	河合 一男	実装技研 実装技術アドバイザー
5	電子制御	牧野 勲	元 日東精工株式会社 開発研究所開発二課長
6	電磁環境適合性(EMC、試験所品質システム(ISO/IEC 17025))	泉 誠一	京都工芸繊維大学 デザイン主導未来工学センター 特任専門職
7	応用微生物学、食品微生物学、微生物工学	麻生 祐司	京都工芸繊維大学大学院 繊維学系 教授
8	食品衛生管理全般	津田 訓範	シーアンドエス(株) シニアスーパーバイザー
9	食品科学、栄養科学、食品機能学	後藤 剛	京都大学大学院 農学研究科 准教授
10	化学(光触媒)	安部 正一	大阪府立大学 名誉教授・元理事・副学長
11	電気化学、湿式製錬	邑瀬 邦明	京都大学大学院 工学研究科 教授
12	プロダクトデザイン	塚本 カナエ	Kanae Design Labo 代表
13	工業デザイン	吉田 治英	元 (株)GK京都 顧問
14	触覚、ロボティクス、メカトロニクス	田中 由浩	名古屋工業大学 電気・機械工学教育類 教授
15	高分子材料強度学、工業製品や部品の長もちの科学	西村 寛之	元 京都工芸繊維大学 繊維学系教授
16	高分子化学、ナノ・マイクロ材料科学、電気化学、光化学	彌田 智一	同志社大学 ハリス理化学研究所 教授
17	機械要素	久保 愛三	クボギヤテクノロジーズ 代表、京都大学 名誉教授
18	CAE解析(開発支援)	田村 隆徳	田村技術士事務所
19	機械設計(3次元CAD)	筒井 真作	キャディック(株) 代表取締役
20	機械加工	松原 厚	京都大学大学院 工学研究科 教授
21	塑性加工学、機械材料加工学	会田 哲夫	富山大学大学院 理工学研究部 教授
22	塑性加工	飯塚 高志	京都工芸繊維大学 機械工学系 教授
23	機械設計・機械加工	川勝 邦夫	舞鶴工業高等専門学校
24	機械設計一般	四方 修	元 日東精工(株) 開発研究所長
25	機械材料学・材料強度学・材料力学	森田 辰郎	京都工芸繊維大学大学院 機械工学系 教授
26	金属材料の防食・腐食	藤本 慎司	鈴鹿工業高等専門学校 校長
27	無機材料工学	青井 芳史	龍谷大学 先端理工学部 教授
28	品質工学	芝野 広志	TM実践塾 代表
29	生体力学、生体材料、シミュレーション医工学	堤 定美	京都大学 名誉教授、金沢工業大学 客員教授
30	産業財産権	間宮 武雄	間宮特許事務所 所長
31	データサイエンス技術	坂井 公一	(有)坂井経営技術研究所 代表取締役

## 2 依頼試験

中小企業等の技術開発・製品開発の促進や品質向上のため、依頼により材料・部品・製品等を預かり、性能や品質、精度等について、中小企業が独自では導入しにくい設備を用いた高精度な測定・試験・分析を実施した。また、試験後は当センター職員が試験結果の説明及び今後の対応や対策を助言する等、幅広い対応をした。

なお、当センターが企業からの依頼により行った試験、分析及び測定は、表4、5、6及び図2のとおりである。

表4 依頼試験件数

年 度	R1	R2	R3	R4	R5
件数合計	1,703 件	1,370 件	1,448 件	1,305 件	1,469 件
手数料収入額 対前年度比	112.5%	91.9%	107.3%	98.2%	118.3%

注：証明書等の件数を除く。

図2 種目別依頼試験実績

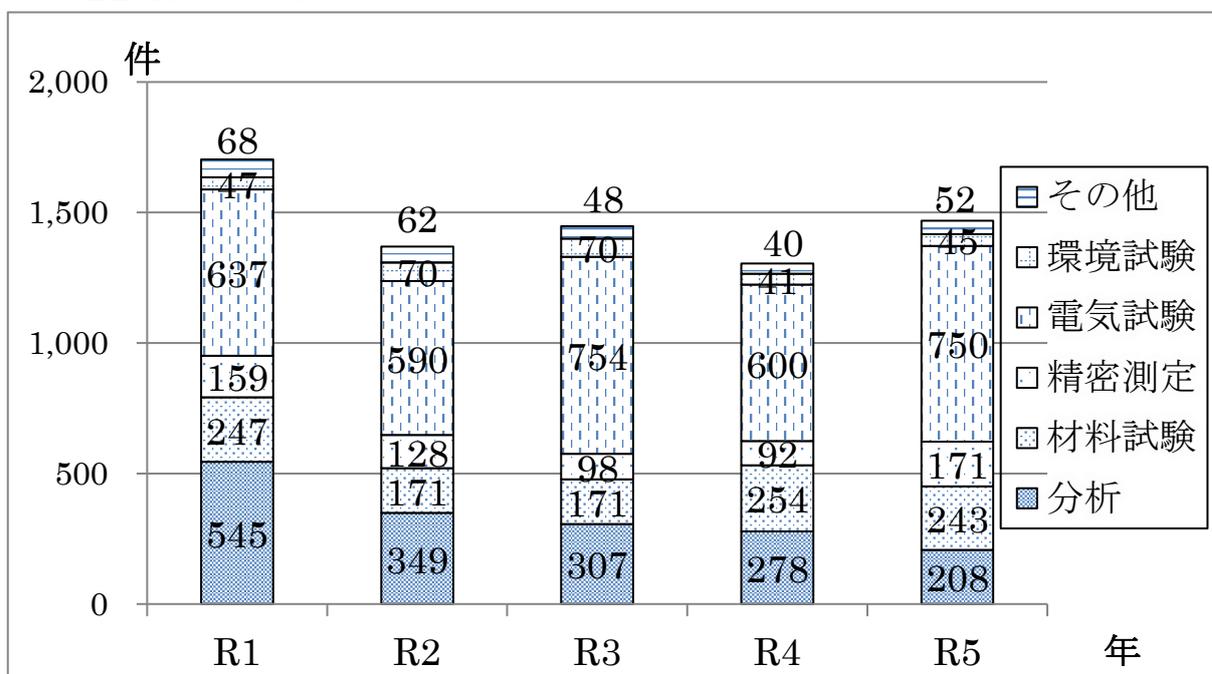


表5 種目別依頼試験件数

項目		年度				
		R1	R2	R3	R4	R5
分 析	化学分析	184	56	42	37	32
	分光分析	147	87	68	80	77
	X線分析	171	146	162	120	56
	表面分析	24	15	6	12	10
	クロマト分析	10	27	4	1	4
	熱分析及びその他の分析	9	18	25	28	29
	小計	545	349	307	278	208
材 料 試 験	強度試験	8	25	8	6	18
	硬さ試験	10	14	6	11	6
	金属組織試験	5	7	3	7	7
	電子顕微鏡試験	143	119	92	89	98
	非破壊試験及びその他の試験	81	6	62	141	114
	小計	247	171	171	254	243
精密測定		159	128	98	92	171
電気試験		637	590	754	600	750
環境試験		47	70	70	41	45
その他の試験及び測定等		68	62	48	40	52
合計		1,703	1,370	1,448	1,305	1,469

表6 実施依頼試験概要

分 析	
化 学 分 析	金属材料等の品質管理及び食品の栄養成分分析が主なものであった。
分 光 分 析	フーリエ変換赤外分光分析による電気・電子部品・プラスチック等の素材解析が多く見られた。 また、ICP 発光分光分析については金属材料のほか、食品等への利用も多かった。
X 線 分 析	蛍光 X 線分析では、品質管理、不具合品の原因究明、研究開発を目的とした金属、セラミックス、有機材料の分析があった。
表 面 分 析	部品の表面変色や微小付着物の成分などの製品不具合の原因調査、防錆コーティングなどの品質評価のための分析があった。
ク ロ マ ト 分 析	液体クロマトグラフによる食品分析が主であった。
熱 分 析 そ の 他 分 析	無機材料等の熱特性分析が主なものであった。

材料試験	
強度試験	各種工業材料の強度特性の評価や、溶接部材の強度測定のための利用が多かった。
硬さ試験	金属製部品の品質確認が主であった。
金属組織試験	鉄鋼材料の熱処理状態の確認、溶接部の健全性評価のための試験が多かった。
電子顕微鏡試験	金属部品の破断面解析、表面処理製品の形状観察、微粒子の形状観察、元素分析等に関する依頼が多かった。
非破壊試験 その他の試験	X線透視装置及びX線CT装置を使用した部品内部の欠陥観察が主であった。
精密測定	
寸法測定 形状測定	機械、電気・電子部品(半導体製造装置部品等)は複雑で高精度な形状のものが求められ、CNC三次元座標測定機、曲面微細形状測定システムによる精密形状測定が多かった。
電気試験	
EMC測定	電気・電子機器製品のEMC測定においては、国際規制をはじめとした各種EMC規制に対応するための評価試験が主であった。
電気試験	電気試験においては、電気材料の誘電率、透磁率の周波数特性評価、導電性能の評価が主であった。
光・マイクロ波 ・ミリ波測定	光関連においては、LED照明の評価が主であった。また、マイクロ波・ミリ波関連においては、電磁波シールド・吸収材料、アンテナ特性、高周波デバイスの評価が主で、その多くが新材料・新製品開発に類する分野であった。
環境試験	
温湿度サイクル試験 冷熱衝撃試験	電子機器及び関連部品の他、幅広い分野の利用があった。
腐食試験	機械部品、車載部品等の幅広い分野の材料、製品の塩水噴霧試験による耐食性、耐久性評価の依頼が多かった。
耐候性試験	外壁材、電気製品、革製品、ゴム製品等の幅広い分野の光劣化に関する試験が主であった。
その他の試験及び測定等	
粒子径分布測定	樹脂・セラミックスの他、錳酸化物等の利用があった。
微生物試験	食品の一般生菌数測定が主であった。
食品物性測定	水分活性測定が主であった。
積層造形	筐体や治具等のプラスチック部品の試作での利用が多かった。
膜厚測定	品質管理のためのめっき膜厚測定が主であった。

### 3 機器貸付

#### (1) 機器貸付

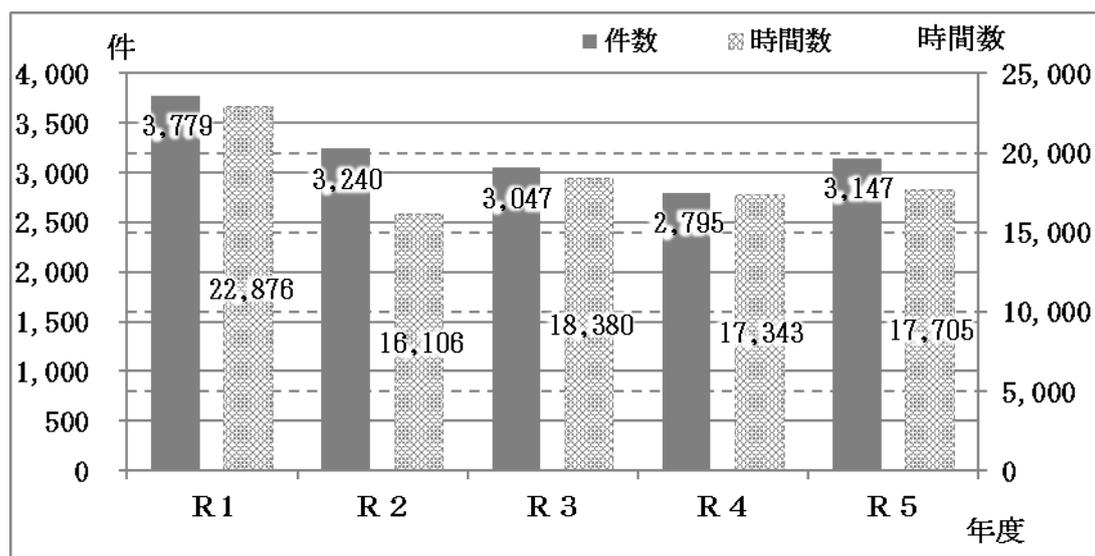
中小企業における技術開発・研究開発・品質改善等を促進し、企業の実験室・研究室としての支援的役割を担うことを目的に、中小企業の方々が自ら操作して試験・評価が行えるように、高度な設備も含めて試験研究用機器を貸し付けた。また、機器利用時には、必要に応じて当センター職員の知識・経験を活かして、的確な支援を行った。

令和5年度は、表7、図3のとおり貸付を行った。利用については、振動試験機(16kN)、分析型走査電子顕微鏡、X線光電子分光分析装置(イオン銃)、フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付)、走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA)の利用が多かった。

表7 機器貸付実績

年 度	R1	R2	R3	R4	R5
件数合計	3,779 件	3,240 件	3,047 件	2,795 件	3,147 件
時間数合計	22,876 時間	16,106 時間	18,380 時間	17,343 時間	17,705 時間
貸付料収入額 対前年度比	108.2%	74.9%	104.1%	101.7%	109.5%

図3 機器貸付実績



## (2) 機器利用実務研修

高度な貸付機器を対象として円滑な利用促進を図るため、要請に応じて機器取扱方法について個別研修を実施した。

個別研修実施人数	734 人
----------	-------

## 4 企業訪問による現地現場対応（中小企業技術応援隊）

業界や中小企業が抱える技術的課題や取り巻く現状等を把握するとともに技術の強みを掘り起こし、中小企業の技術力強化を支援した。

表 8 中小企業技術応援隊実績一覧

名 称	実 績
企業訪問	398 社
京都府中小企業技術センター協力会の活動支援(セミナー等)	2 回 41 名
研究会、セミナー・講習会での技術支援	回 数 : 220 回
	延べ参加者 : 4,724 名 <sup>(注)</sup>

(注) Web 参加・視聴を含む。

## 5 企業への助成・表彰等に係る技術審査

(公財)京都産業 21 による技術顕彰「京都中小企業技術大賞」等における候補企業の推薦や技術内容の調査、ヒアリング等技術面からの支援を行った。

表彰等候補企業調査数	12 件
------------	------

## 6 府施策と連携した技術的対応

### (1) 電磁環境両立性（EMC）国際規制対応支援事業

電気・電子機器を国内外で販売するためには、欧州、米国を始め、中国、韓国等、全世界で実施されている EMC 規制基準に適合させる必要がある。そのため、校正(標準化)した計測機器と電波暗室を提供して関連業界が各種規制を効率的にクリアできるように支援した。

## (2) デザインワーク展示事業

中小企業等において商品企画やデザインを検討する場合、どのように、どのデザイナーに相談すればいいのか、費用はどれくらいかかるのか等が分からず、活用できていないのが現状である。そこで、デザイナーと企業が出会える場を提供することによって、デザインマッチングを推進するためにデザインワークの展示発表を行った。

表9 デザインワーク展示事業概要

名 称	令和5年度デザインワーク展示事業 KYOTO DESIGN WORK SHOW ーものづくり企業とデザインのマッチングー
日 時	令和6年2月15、16日 10～17時
場 所	京都府総合見本市会館「京都ビジネス交流フェア2024」会場内
出展内容	プロダクトデザイン事務所8社とそのデザインワーク事例
来 場 者	約5,600名

## (3) 個別デザイン課題解決のための研究・開発プロジェクトの実施と成果公開

商工業全般にわたる企業や業界、各種団体が抱えている様々なデザイン課題の中からデザイン開発のケーススタディとして適切なものをテーマとして取り上げ、産業デザイン手法を活用した課題の具体的な解決に取り組み、産業デザインの導入・活用の事例としてとりまとめ、広く普及を図ることによりデザインの戦略的な活用を推進した。

## 7 地域技術相談会の開催（中小企業技術応援隊）

広域振興局、府内市町村、産業支援機関や地域業界団体との積極的な連携により、中小企業への技術支援を行った。

## 8 出張技術相談会の開催（中小企業技術応援隊）

中信ビジネスフェア2023に当センター独自のブースで出展した。来訪企業及び出店企業ブースを職員が訪問して当センターの企業支援の説明等を行い利用促進と周知を図った。（計28社36名（職員ごとの重複除く））

## Ⅲ 人材育成

### 1 研究会、セミナー・講習会の開催

これまでのセミナー等の参加者アンケートの情報を踏まえ、最新の技術動向・企業ニーズに対応するとともに、研究成果の普及や参加者に有益な研究会、セミナー等を実施した。

#### (1) 研究会

※開催回数等は、表12のとおり。

##### ① 新工芸研究会 (企画連携課 デザイン情報係)

京都の文化と工芸の歴史的経緯を踏まえながら、現代の新たな技術、素材を取り入れ、伝統工芸を横断的に結んだ新たな京都工芸の創造につなげるため、調査研究や試作開発研究・視察等を行った。

##### ② ものづくり分析評価技術研究会 (基盤技術課 材料評価係)

現場で生きる分光分析に関する系統的かつ高度な知識とノウハウを兼ね備えた“ものづくり技術人材の育成”を支援し、ものづくり企業の技術力の向上と製品開発の後押しを図った。

##### ③ 京都光技術研究会 (応用技術課 電気通信係)

幅広い光関連技術分野の業界の動向・ニーズについて情報交換を行い、企業間連携の促進、課題に応じた共同研究の立ち上げ等のマッチングを支援した。

##### ④ 京都実装技術研究会 (応用技術課 電気通信係)

電子機器の生産に深く関わる接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の課題の解決を目的とした、セミナーやワーキング活動を行った。

##### ⑤ 表面処理技術研究会 (応用技術課 表面構造係)

京都府鍍金工業組合青年部と共催し、若手技術者、経営者の技術者向上のため、品質管理、新規市場の開拓について研究紹介や技術講習会を開催した。

##### ⑥ デジタルマニファクチャリング研究会 (中丹技術支援室)

開発プロセス（設計－試作－評価）での CAE の活用を体感できる研究会活動を通じて、中小企業のものづくり現場におけるフロントローディングを後押しした。

## **⑦ 製品開発企画研究会** (中丹技術支援室)

中丹地域を中心としたものづくり企業の製品開発力を高め、経営資源を強化するために、自社の強みやスキルを活かし、地域産業の育成に貢献できる新製品の開発に必要な基礎知識や開発の進め方を実践的に学ぶ研究会を開催した。

## **⑧ けいはんな技術活用研究会** (けいはんな分室)

KICK に導入されている映像関連機器、工業製品の設計開発支援機器を活用し、技術開発、市場開拓、人材育成等について、けいはんな地域の企業、研究所、大学等と連携して新技術開発と市場開拓のための研究会を開催した。

## **(2) セミナー・講習会等**

※各セミナー・講習会等の開催回数等は、表12のとおり。

### **① 企業情報化支援セミナー** (企画連携課 デザイン情報係)

中小企業の情報化を支援するために、関連団体と連携して開催する、情報システムを活用した業務効率化等のための最新技術や動向に関するセミナーを開催した。

### **② マーケティング+デザイン・ゼミナール** (企画連携課 デザイン情報係)

人口減少による国内市場縮小に対応するべく、より正確なマーケティングにより、国内だけでなく世界市場に販路を構築することを目的としたゼミナールを開催した。

### **③ 映像制作技術講習会** (企画連携課 デザイン情報係)

仕事の中で映像を利用した情報発信の機会が増えている。初心者が失敗しがちな注意点ははじめ、本格的な撮影テクニック、機材選びから編集ノウハウまで実習を交えながら「映像技術の基礎」を学ぶ講習会を開催した。

### **④ 機械設計基礎講座** (基盤技術課 設計計測係)

機械設計者は設計から加工まで、広い知識が必要とされる設計技術者を対象に、設計・製図に必要な材料・加工等の知識や寸法公差・幾何公差の知識について習得する講座を開催し、設計技術力の高い人材の育成を図った。

### **⑤ 3D 技術活用セミナー** (基盤技術課 設計計測係)

3D CAD、3D プリンタ、3D スキャナなど 3D 技術及びその周辺技術の最新動向を紹介し、ものづくり企業の技術と製品開発力の向上、人材育成を支援するセミナーを開催した。

### **⑥ ものづくり先端技術セミナー** (基盤技術課 材料評価係)

ものづくり技術開発の高度化の促進を目的にした、新機能材料、表面処理技術、精密加工技術、計測評価技術等の先端技術情報に関するセミナーを開催した。

**⑦ 化学技術セミナー** (基盤技術課 化学分析係)

新しい機能材料、加工技術、分析技術や国内外の化学物質規制などの情報を提供した。また、RoHS 規制等の国際的化学物質規制や国内の環境関連法令への対応を支援した。

**⑧ 電磁波技術セミナー** (応用技術課 電気通信係)

5G通信などのマイクロ波・ミリ波や電磁ノイズ対策(EMC)など、電磁波に関する様々な技術に関するセミナーを開催した。

**⑨ 光ものづくりセミナー** (応用技術課 電気通信係)

光関連技術分野の製品開発を行っている企業や、これから新規分野に進出を図りたいと考えている企業を対象に、光関連技術のトレンドや話題の提供を行うセミナーを行った。

**⑩ 実装技術スキルアップセミナー** (応用技術課 電気通信係)

電子部品等の実装において、各社の課題となっている事象の解決を目的に、現場の実情に応じた実習をメインにしたセミナーを開催した。

**⑪ 食品・バイオ技術セミナー** (応用技術課 食品バイオ係)

食品・バイオ関連技術分野の製品開発・製造・販売を行っている企業を対象に、「フードテック」、「賞味期限延長と海外進出」、「機能性表示食品制度」の3つのセミナーを開催し、食品市場動向から見る技術開発の方向性等の新しい技術情報を提供した。

**⑫ 表面技術セミナー** (応用技術課 表面構造係)

表面処理技術や評価技術、話題となっている製品、材料、加工技術等に関する幅広い情報の提供や大学等の研究シーズの発信を行うとともに、企業連携につながる研究テーマの発掘を目的としたセミナーを開催した。

**⑬ IoT 実習セミナー** (中丹技術支援室)

デジタルトランスフォーメーション(DX)を進める上で欠かせない、電子部品をコントロールするために必要な基礎知識とプログラミングを、参加者自らがPCと試作ボードを使って学ぶ、実習中心のセミナーを開催した。

**⑭ 機器操作・活用セミナー** (中丹技術支援室)

中小企業の技術者自らが当センター中丹技術支援室の機器類を操作、活用するとともに、より多くの評価を行い、生産現場での問題解決の幅を広げることができるようにする実習形式のセミナーを行った。

**⑮ 工業技術研修** (中丹技術支援室)

綾部工業研修所(事務局:綾部商工会議所)と共催し、基礎技術力を高めて地域の若手技術者の養成を図る、機械科コースと電気科コースの研修を開催した。

**⑯ 新分野進出支援講座** (中丹技術支援室)

中小企業の新分野への進出や展開を支援するため、装置・システム開発の事例の紹介等を行った。

**⑰ 品質管理(QC)講座** (中丹技術支援室)

ものづくりの現場における生産管理力の向上と、製品の信頼性向上のために重要な品質管理の知識を習得する講座で、QC 検定 3 級レベルの基礎コースと、2 級レベルの上級コースを開催した。

**⑱ 産業人材育成基礎講座** (中丹技術支援室)

中丹地域に立地する企業の技術者を対象にした、基礎的な知識を体系的に学べる講座を行った。制御技術に関する講座を開催した。

**⑲ 京都大学宇治キャンパス産学交流会** (けいはんな分室)

京都大学宇治キャンパスにある 4 研究所(化学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所、防災研究所)との産学交流会を開催した。

## 2 研究生・実習生の受け入れ

中小企業の技術者・研究者等の技術開発力・研究能力の向上を支援するため、研究生として受け入れ、技術研修や共同研究を行った。また、大学からの依頼を受け学生を実習生として受け入れ、実習指導を行った。

表 10 研究生等の受託実績

年度 種別	R1	R2	R3	R4	R5
研究生	233 (5)	96 (1)	180(3)	144(2)	121 (3)
実習生	59 (4)	147 (4)	3(3)	29(3)	30(3)
合計	292 (9)	243 (5)	183(6)	173(5)	151(6)

注：延べ受入日数(人日)及び( )書きで受入実人数を掲載

### 3 中小企業への啓発等

#### (1) 京都府中小企業技術センター協力会への支援

京都府中小企業技術センター協力会に対して、情報誌や技報をはじめとする各種情報提供、ホームページでの会員企業の紹介や交流事業・見学会の開催など、会員企業の発展に資する取組を実施した。また、会員企業を訪問してセンター事業等に対する意見を直接聞くことによりセンター業務への反映や協力会事業の充実を図った。

表 11 センター協力会交流事業実績

実施日	事業内容	参加者
7月24日	ポスターセッション ・京都府中小企業技術センターの研究成果発表 ・会員企業による事業紹介、製品展示	22名
10月24日	見学会 京都機械工具株式会社	19名

表 12 主な研究会・セミナー等実施概要

名 称	回数	延べ参加者 数 (Web 参加・視聴 を含む)	担当課・室
研 究 会			
① 新工芸研究会	12	233	企画連携課
② ものづくり分析評価技術研究会	4	224	基盤技術課
③ 京都光技術研究会	8	172	応用技術課
④ 京都実装技術研究会	6	183	
⑤ 表面処理技術研究会	2	57	
⑥ デジタルマニファクチャリング研究会	22	64	中丹技術支援室
⑦ 製品開発企画研究会	2	54	
⑧ けいはんな技術活用研究会	1	11	けいはんな分室
セミナー・講習会等			
① 企業情報化支援セミナー	3	679	企画連携課
② マーケティング+デザイン・ゼミナール	10	102	
③ 映像制作技術講習会	3	7	
④ 機械設計基礎講座	4	60	基盤技術課
⑤ 3D 技術活用セミナー	2	39	
⑥ ものづくり先端技術セミナー	1	102	
⑦ 化学技術セミナー	1	18	
⑧ 電磁波技術セミナー	2	129	応用技術課
⑨ 光ものづくりセミナー	2	71	
⑩ 実装技術スキルアップセミナー	1	17	
⑪ 食品・バイオ技術セミナー	3	112	
⑫ 表面技術セミナー	2	113	
⑬ IoT 実習セミナー	8	110	中丹技術支援室
⑭ 機械操作・活用セミナー	4	17	
⑮ 工業技術研修	74	925	
⑯ 新分野進出支援講座	3	142	
⑰ 品質管理(QC)講座	9	512	
⑱ 産業人材育成基礎講座	10	149	
⑲ 京都大学宇治キャンパス産学交流会	4	177	けいはんな分室
その他 (研究成果発表会他)	17	245	
合 計	220	4,724	

## IV 研究開発

### 1 所内研究、共同研究

研究については、以下を基本として実施した。

- ・ ものづくり基盤技術の高度化や企業・業界ニーズに基づく研究
- ・ 中小企業にとって今後展開が見込まれる分野での技術蓄積（ものづくり技術の厚みを増す）を支援する研究
- ・ 新産業創出や成長分野に係る研究
- ・ 重点課題項目に関する研究

#### (1) 職員による研究調査

##### ① 3DA データ活用による検査業務効率化の検証 (基盤技術課)

CNC 三次元座標測定機(CMM)を使った測定において、代表的な中間フォーマットの 3DA モデルを読み込んだ際に表示される製品製造情報(PMI)を確認し、従来の測定・解析プロセスと 3DA モデルを活用した測定・解析プロセスを比較し、複数の形状において業務効率化の効果を検証した。

##### ② 印刷技術を用いた機能性電磁材料の開発 (応用技術課)

5G や次世代 6G 通信等で使用されるミリ波領域やテラヘルツ領域の周波数利用のためには、付随技術として、これらの電磁波を透過あるいは反射する等の機能性材料開発が必要である。そこで簡便な印刷技術を活用し、印刷積層でカスタマイズ可能な新規機能性電磁材料開発を進め、その実用性について検討した。

##### ③ ミリ波-テラヘルツ波帯の特性評価の系統的調査 (応用技術課)

本研究ではミリ波、テラヘルツ波帯の特性評価装置の結果（反射特性・透過特性）から材料物性評価にかかるアルゴリズムについて改良を実施した。その結果、多層構造物でも材料物性評価が計算できるようになった。

##### ④ 産業用 X 線 CT 撮像における金属アーチファクトの除去 (応用技術課)

アルミ及び鉄材料について比較用ファントムを使用して、金属アーチファクトの除去を行った。ファントムの測定により、アルミ材および鉄材のどちらについても、撮像結果からアーチファクトが軽減されることが確認できた。また、ファントムを使用せず計算により求めた値を使用することでもアーチファクトの除去が行えることが確認できた。

## ⑤ 放射性電磁界イミュニティ試験における電界レベル高強度化の検討

(応用技術課)

放射性電磁界イミュニティ試験における電界レベル高強度化を検討するため、試験電界強度のアンテナ距離依存性を確認するとともに、工業環境下で求められる試験電界強度（10V/m）での電界均一性を、アンテナ距離を近づけることで確認できた。

## ⑥ 有機溶媒含有廃液中のイリジウムの回収

(中丹技術支援室)

イリジウムは白金族に属する貴金属元素で、様々な工業分野で用いられている。イリジウムは希少で高価であることから使用過程においてイリジウムが混入した溶液は回収して再度製品へとリサイクルすることが求められている。本研究では有機溶媒中のイリジウムの回収方法について検討した。その結果、亜鉛粉末を加えることでイリジウムを還元析出させるセメンテーションにおいて、溶液の pH を低くすることでイリジウムの回収率が向上することが明らかとなった。

## 2 受託研究

中小企業等の技術課題の解決や新技術又は新製品の開発等につなげるため、中小企業等の依頼に応じて、研究、試験分析等を 3 件受託した。

## 3 研究課題評価

業界のニーズや課題解決のための研究推進、府民理解の促進、研究者の創造性の向上と柔軟で競争的な研究環境の創出、より効果的・効率的な研究の促進のために、センターが実施する研究課題について、内部評価検討会議及び外部の有識者で構成する外部評価委員会で評価を行い、評価結果の公表を行った。

## 4 知的財産の活用

研究開発等から得られた成果を積極的に外部へ公表するとともに、知的財産として保護すべきものについては、府として出願・権利化を行い京都府知的財産総合サポートセンターとも連携しながら、企業等への技術移転やホームページ、各種展示会等において、当センター保有の知的財産の広報を行った。

さらに知的財産権やノウハウ、人材、技術力等の目に見えない企業の強みである知的資産を活かす知的資産経営（知恵の経営）を推進するため、京都府知的財産総合サポートセンターや（公財）京都産業 21 と連携し、知財・技術・経営のワンストップサービスを強化した。<sup>(注)</sup>（注）共有の特許権の場合は、共有者の了解が得られたものに限る。

表 13 保有特許一覧（令和 6 年 3 月 31 日現在）

登録年	発 明 の 名 称	登録番号
平成 27 年	「高電圧スイッチ回路およびこれを用いた X 線パルス発生装置」	5821050
平成 29 年	「漬物の製造方法」	6149249
平成 30 年	「乳製品乳酸菌飲料の製造方法」	6340513
令和元年	「乳酸菌およびこれを用いた乳製品乳酸菌飲料の製造方法」	6518909
令和 3 年	「乳酸発酵豆乳の製造方法」	6829430

## 5 企業との協働による具体的な技術開発の推進

### 企業連携技術開発支援事業

企業連携による新たな技術開発や新事業展開のために、イノベーション創出を目指し研究開発を行っている企業グループ等を対象に、技術課題の解決等を支援した。

支援にあたっては、企業グループとセンター職員等が試作開発等の検討・調整、必要な種々の技術や評価法を相談・解決する協働スペースである「企業連携技術開発室」を活用した。

表 14 企業連携技術開発支援事業一覧

年度	研究開発の名称	連携職員
R 3～R 5	京都光るファイバーにおける実用化の検討	応用技術課 電気通信係

## 6 研究発表・出講

表 15 □頭発表実施状況一覧

題目	発表会	月日	講師
テラヘルツ光を用いた接着層の非破壊的水没履歴の検出方法	(一社)プラスチック成型加工学会	11月29日	基盤技術課 谷田副主査

表 16 出講状況一覧表

実施日	名称	場所	回数	延べ人数	講師
7月10日	京都クオリアフォーラム 博士キャリアメッセ 2023	立命館大学朱雀キャンパス	1	140	基盤技術課 倉橋主任研究員 応用技術課 鴨井主任研究員
8月25日	めっき排水巡回指導	オンライン	1	8	応用技術課 松延主任研究員 中村副主査
10月13日	産業技術支援フェア IN KANSAI 2023	大阪産業創造館＋オンライン	1	約 600	基盤技術課 倉橋主任研究員 応用技術課 坪井副主査
10月25日	第 29 回表面技術分科会	和歌山県工業技術センター＋オンライン	1	61	応用技術課 松延主任研究員
10月26日	第 29 回表面技術分科会	和歌山県工業技術センター＋オンライン	1	58	応用技術課 松延主任研究員
3月26日	めっき排水巡回指導報告会	当センター	1	28	応用技術課 大藤課長 松延主任研究員 中村副主査

※ 延べ人数は一部主催者発表の数値を記載している。

## V 関係機関との連携

---

### 1 広域での公設試験研究機関の連携

産業技術連携推進会議などを通じて他の公設試験研究機関及び国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携・協力し、各技術分野、地域の技術力向上などを図った。

また、令和4年11月に発足した「関西広域産業共創プラットフォーム事業」において関西広域連合内の11公設試験研究機関を中心とした各機関と連携し、情報の共有・活用・発信、設備の域内利用の促進等に取り組んだ。

### 2 産業支援機関との連携

(公財)京都産業21、京都府知的財産総合サポートセンターと当センターの三者による連携を強化し、経営・技術・知的財産のワンストップ支援体制を充実した。

### 3 大学との連携

最新の技術動向に対応できる専門家の発掘を推進し、特別技術指導員等の人脈を補強するとともに大学との共同研究を推進した。

また、企業ニーズに基づく新事業展開や大学の技術シーズの企業への移転の橋渡し、大学との共同研究を推進した。

### 4 業界団体等との連携

#### (1) 溶接技術指導事業

ものづくりの基盤技術である溶接技術の向上を図るため、(一社)京都府溶接協会等関連団体と連携した。

#### (2) 表面処理技術支援事業

めっき業を中心とする表面処理業においては、亜鉛等の規制強化に伴う排水処理を含めた製造工程の管理と改善並びに発注先の厳しい要求に応える品質管理が求められている。この現状に対応する技術支援、情報提供と併せて現場で生じている課題解決に向けた提案を行った。

## VI 情報発信

### 1 中小企業等への情報提供の強化と、広く府民の皆さんへの広報

広報を通じて当センターをより知っていただくとともに、日々の技術支援業務の円滑かつ効果的な推進に役立つよう取り組んだ。

表 17 情報発信実施状況

内 容		実 績	備 考
ホームページ ( <a href="https://www.kptc.jp/">https://www.kptc.jp/</a> )	閲覧件数	267,314PV	PV(ページビュー)：ページが開かれた回数
メールマガジン	発行回数	46回	
情報誌 「クリエイティブ京都 M&T」	発行回数	4回	年4回(季刊)
	発行部数	各回6,000部	ホームページにも掲載

### 2 施設の公開

当センターの活用の幅を広げていただくとともに、より多くの企業や府民の皆さんに当センターの役割や機能を知っていただくために、施設公開や視察・研修受け入れを実施した。

表 18 主な視察等受入れ実績

(本所)

月 日	団体等の名称	人 数
4月14日	商工労働観光部課長公所長会議	76
7月5日	京田辺市商工会	8
7月24日	施設公開(業務見学ツアー)	12
11月28日	(公社)京都工業会	17
2月6日	(公社)京都工業会	9

(中丹技術支援室)

月 日	団体等の名称	人数
8月17日	綾部ものづくり体験ツアー	40
10月6日	京都府市長会	30
12月12日	京都工芸繊維大学	10

(けいはんな分室)

月 日	団体等の名称	人数
6月23日	(独行) 中小企業基盤整備機構	2
7月10日	精華町商工会	3
7月26日	ベトナム商工省ミッション団	26
7月28日	西舞鶴高校理数探求科	10
8月28日	(公社) 新化学技術推進協会	2
9月8日	群馬県議会	19
10月30日	(国研) 産業技術総合研究所	1
11月21日	在日スイス大使館	1
11月30日	九州大学移転・跡地対策協議会、福岡市	29
2月6日	南相馬市市議会	1
2月9日	京都産業21環(リング)の会	10

### 3 ニーズの変化に対応した情報の提供

中小企業の技術的諸課題の解決に向けて実施した研究や調査の結果をとりまとめて発行した。また、毎年夏に実施している研究成果発表会を令和5年度は「研究成果の発表と業務紹介」としてオンライン配信するとともに、センター協会のイベント内でポスターセッションを行うなど広く情報発信した。

表 19 研究成果の発表等概要

事業名	研究成果の発表と業務紹介
期 間	令和5年8月1日(火)～8月31日(木)
方 法	オンライン配信
内 容	○ 職員による研究成果の発表 職員が取り組んだ研究開発や調査研究の成果の普及、実用化のための発表等

表 20 研究成果の発行物

名 称	内 容
技報 NO. 51	令和4年度に実施した研究等の成果

## Ⅶ 地域産業の活性化

### 1 北部地域ものづくり産業振興

#### (1) デジタルマニファクチャリング推進事業 【再掲】

中丹地域のものづくり企業が CAE を用いた設計・シミュレーション解析・試作・評価の一連の流れを体感できる研究会を開催した。

#### (2) 新分野進出支援事業（新分野進出支援講座） 【再掲】

地域の中小企業の新分野への取り組みを支援するための講座を開催した。新たな技術の修得や新分野進出につながる内容で実施した。

#### (3) 人材育成事業【再掲】

府北部の人材を育成するために、デジタルマニファクチャリング研究会、IoT 実習セミナー、工業技術研修、産業人材育成基礎講座などを開催した。

表 21 研究会・セミナー等一覧

名 称	回数	延べ参加者数
デジタルマニファクチャリング研究会	22 回	64 名
製品開発企画研究会	2 回	54 名
IoT 実習セミナー	8 回	110 名
機器操作・活用セミナー	4 回	17 名
工業技術研修	74 回	925 名
新分野進出支援講座	3 回	142 名
品質管理(QC)講座	9 回	512 名
産業人材育成基礎講座	10 回	149 名

## 2 けいはんな地域における大学・研究機関と企業との連携推進

### (1) 大学・研究機関と府内中小企業のマッチング

学研都市を中心とした府南部及びけいはんな地域に立地する大学・研究機関と府内企業の技術シーズとそれを活用したい企業との出会いの場を提供するため、京都大学宇治キャンパスとの産学交流会を開催した。

表 22 交流会開催状況一覧

名 称	回 数	延べ参加者数
京都大学宇治キャンパス産学交流会	4 回	177 名

### (2) 課題解決支援

新製品・新技術開発を目指す企業・業界団体が抱えている具体的な技術課題の解決を支援した。

## Ⅷ 技術支援体制の充実・強化

---

地域の中小企業等に満足いただける技術支援を行うために、当センター内部において技術支援体制の充実・強化に取り組んだ。

### 1 技術職員の資質向上

中小企業の期待に応えられる技術・知識、評価・提案力、研究開発力や他機関等とのコーディネート力の向上を図るため、企業技術者と技術職員が共に学ぶ研究会・セミナーの実施や以下の取り組みを行った。

- ① 各企業のものづくり現場への積極的な訪問
- ② 研修会・講習会・学会への参加
- ③ 計画的な研修機関・研究機関への派遣

### 2 機器利用者への支援体制強化

機器利用者の利便性向上と利用ノウハウの蓄積・共有を図るため、分析装置、試験・測定装置等の主要機器についてジョブローテーションを行い、複数担当体制の強化を図った。

### 3 知的財産の管理

当センターの知的財産権の取得・活用等の考え方をまとめた「知的財産権ポリシー」を適正に運用するとともに、関係機関等との情報交換に努め、知的財産の適切な管理・活用を図った。

### 4 機器の整備

製造業における合理化、品質管理、製品開発を支援するため、試験研究用機器の機能拡充を計画的に行った。令和5年度は表23の機器を導入した。

表 23 令和5年度導入機器

<p>フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) (（公財）JKA の補助事業利用)</p>	<p>この装置は、有機物など化合物の同定や官能基などの原子団の有無、分子の結合状態を調べるもので、指示した物質で構成されたものであるかどうかの確認、製品の混入異物の同定、製品の付着物の同定等に利用されている。導入した装置は、全真空システムを搭載しており、水蒸気や炭酸ガスによる影響のない高感度測定が可能で、中赤外～遠赤外領域までの広帯域測定ができるようになった。赤外顕微鏡のスマートマッピングと顕微 ATR により試料上の目的部位を狙って測定することが可能である。</p> <p>&lt;性能&gt; 最高分解能：0.25cm<sup>-1</sup> スペクトル波数：7800-30cm<sup>-1</sup></p> <p>&lt;測定法&gt; 通常分析：ATR 法、透過法、反射法、拡散反射法、高感度反射法 顕微分析：ATR 法、透過法、反射法</p>
--	---

## 5 業務運営に係る基盤的事項

当センターの限られた資源を活用し、府内中小企業の技術支援を効果的に行う事務・事業を実施するため、予算を効率的に執行するとともに、「物品管理マニュアル」に基づいて適正な物品管理を行った。

(参考)

### 審査会等への出席一覧

開催日	名称	場所	担当課室	出席者
4月6日	京都府溶接技術競技会 運営委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	中西課長 倉橋主任研究員 谷田副主査
4月21日	第54回京漆器展審査会	みやこめっせ	企画連携課	松井主任研究員
5月12日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田副主査
5月13日	京都府溶接技術競技会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	吉田副所長 中西課長 倉橋主任研究員 谷田副主査
5月14日	京都府溶接技術競技会 審査	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田副主査
6月6日	京都府溶接技術競技会 審査委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	倉橋主任研究員 谷田副主査
6月13日	京都府溶接技術競技会 運営委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	中西課長 倉橋主任研究員 谷田副主査
6月14日	めっき技術検定全体会 議	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
7月7日	技能検定委員会(機械 検査)(前期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
7月8日	技能検定(機械検査) (前期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
7月12日	京都府溶接技術競技会 表彰式	当センター	基盤技術課	吉田副所長 中西課長 倉橋主任研究員 谷田副主査
7月12日	西陣織伝統工芸土産地 委員会	西陣織会館	企画連携課	福岡課長 片瀬技師
7月15日	めっき検定実技試験	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
7月20日	京仏具伝統工芸土産地 委員会	サンプル京都ビル	企画連携課	福岡課長

開催日	名称	場所	担当課室	出席者
7月22日	めっき検定実技試験	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
8月4日	技能検定委員会(熱処理)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	谷田副主査
8月5日	技能検定(熱処理)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	谷田副主査
8月9日	めっき技術検定採点会議	メテック(株)	応用技術課	松延主任研究員 中村副主査
8月27日	技能検定(熱処理)	長浜バイオ大学 京都キャンパス河原町学舎	基盤技術課	谷田副主査
9月8日	京仏具伝統工芸土産地委員会(作品審査)	京都市勧業館	企画連携課	福岡課長
9月8日	第46回京仏壇・京仏具技術コンクール審査	京都市勧業館	企画連携課	福岡課長
9月12日	京都府統計グラフコンクール予備審査会	京都府職員福利厚生センター	企画連携課	松井主任研究員
9月15日	京都府統計グラフコンクール審査会	京都府庁3号館講堂	企画連携課	松井主任研究員
10月12日	シルバー美術展作品審査	京都文化博物館	企画連携課	福岡課長
10月23日	京仏具伝統工芸土産地委員会(工程審査)	京都府仏具協同組合	企画連携課	福岡課長
1月12日	技能検定委員会	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
1月13,14日	技能検定委員会(機械検査)(後期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員
1月22日	京都府溶接技術競技会運営委員会	当センター	基盤技術課	中西課長 倉橋主任研究員 谷田副主査
1月25日	京都工芸土産品協同組合 春の新作コンクール	みやこめっせ	企画連携課	片瀬技師
1月27日	技能検定採点(機械検査)(後期)	ポリテクセンター京都	基盤技術課	上原主任研究員

# 研究会、セミナー・講習会等実績

※延べ人数には、Web参加・視聴を含む

実施日	名称	場所	回数	延人数	Web参加	講師	共催団体
企画連携課							
4月11日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	9	-		京都のアドバンテージを考える会
4月17日	新工藝研究会	萬重	1	21	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
4月26日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	13	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏 (公財)日本デザイン振興会 川口真沙美 氏 iF日本オフィス 高田昭代 氏	日本デザイン振興会 iF日本オフィス
4月27日	研究事業推進委員会(R4事後評価)	オンライン	1	18	18		
5月9日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	10	-		京都のアドバンテージを考える会
5月9日	研究事業推進委員会(R5事前評価)	オンライン	1	18	18		
5月16日	新工藝研究会	当センター/オンライン	1	18	1	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
5月18日	映像制作技術講座	当センター	1	2	-	松井主任研究員	
6月13日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	10	-		京都のアドバンテージを考える会
6月29日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	9	-		京都のアドバンテージを考える会
6月19日	新工藝研究会	当センター/オンライン	1	19	1	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
6月28日	企業情報化支援セミナー	京都情報大学院大学 /オンライン	1	253	221	NTTコミュニケーションズ(株) 大西真樹氏	(一社)京都府情報産業協会
6月28日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	14	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
6月22日	映像制作技術講座	当センター	1	2	-	松井主任研究員	
7月11日	nucadocoワークショップ	当センター	1	26	-		京都のアドバンテージを考える会
7月13日	映像制作技術講座	けいはんな分室	1	3	-	松井主任研究員	
7月24日	研究成果発表会	当センター	1	18	-		京都府中小企業技術センター協力会
7月25日	新工藝研究会	当センター	1	19	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
7月26日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	11	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
7月31日	iFデザインサロン	当センター	1	15	-	iF International Forum Design CEO Uwe Cremering	iF International Forum Design GmbH / iF日本オフィス
8月28日	新工藝研究会	当センター/オンライン	1	19	1	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
8月22日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	9	-		京都のアドバンテージを考える会
9月6日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	7	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏 iF日本オフィス 高田昭代 氏	
9月25日	新工藝研究会	ダニエルズアルバ	1	17	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
9月26日	モデル工場会见学会	(株)西田製作所	1	27	-		京都府モデル工場会
10月16日	新工藝研究会	当センター	1	20	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
10月26日	企業情報化支援セミナー	京都コンピュータ学院 京都駅前校	1	134	-	(株)船井総研デジタル 齊藤芳宜 氏	(一社)京都府情報産業協会
10月4日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	12	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏 オフィス・マックス・シバタ(同)代表 柴田真 氏	
10月24日	センター協会会见学会	京都機械工具(株)	1	26	-		
11月8日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	7	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
11月10日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	9	-		京都のアドバンテージを考える会
11月20日	新工藝研究会	当センター/オンライン	1	16	2	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
12月6日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	9	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏 アプリdeコスメ代表 高橋織江 氏	
12月13日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	9	-		京都のアドバンテージを考える会
12月18日	新工藝研究会	当センター/オンライン	1	21	2	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工藝研究会
1月12日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	8	-		京都のアドバンテージを考える会
1月15日	新工藝研究会	萬重	1	26	-	同志社女子大学 村井陽平 氏 (株)ビハナコンサルティング 岡本幸樹 氏	新工藝研究会

実施日	名称	場所	回数	延人数	Web参加	講師	共催団体
1月25日	企業情報化支援セミナー	京都コンピュータ学院 京都駅前校	1	292	-	(株)Keigan 代表取締役 徳田貴司 氏	(一社)京都府情報産業協会
1月30日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	10	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
2月13日	京都のアドバンテージを考える会	当センター	1	8	-		京都のアドバンテージを考える会
2月19日	新工芸研究会	当センター	1	18	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工芸研究会
2月21日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	9	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
2月27日	モデル工場会見学会	兵神装備(株)	1	16	-		京都府モデル工場会
3月18日	新工芸研究会	当センター	1	19	-	同志社女子大学 村井陽平 氏	新工芸研究会
3月28日	マーケティング+デザイン・ゼミナール	当センター	1	10	-	Kanae Design Labo代表 塚本カナエ 氏	
基盤技術課							
8月22日	3D技術活用セミナー	当センター/オンライン	1	16	13	ポリウムグラフィックス(株) 木下修平氏	
9月26日	機械設計基礎講座	当センター/オンライン	1	20	17	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏 (日本工業大学非常勤講師)	
10月19日	機械設計基礎講座	当センター/オンライン	1	16	14	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏 (日本工業大学非常勤講師)	
10月24日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/オンライン	1	29	16	関西学院大学 尾崎幸洋 氏 近畿大学 森澤勇介 氏	(公財) 京都技術科学センター
11月13日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/オンライン	1	32	17	関西学院大学 尾崎幸洋 氏 (株)右近工舎 右近寿一郎 氏 農研機構 池羽田晶文 氏 鳥根大学 石垣美歌 氏	(公財) 京都技術科学センター
11月14日	機械設計基礎講座	当センター/オンライン	1	14	12	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏 (日本工業大学非常勤講師)	
12月5日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/オンライン	1	36	14	関西学院大学 尾崎幸洋 氏 産総研 新澤英之 氏 大阪電気通信大学 森田成昭 氏	(公財) 京都技術科学センター
12月8日	化学技術セミナー	当センター/オンライン	1	18	14	京都大学名誉教授 河合潤 氏	
12月12日	3D技術活用セミナー	当センター/オンライン	1	23	20	QVIジャパン(株) 中村聡 氏	
12月14日	機械設計基礎講座	当センター/オンライン	1	10	0	QVIジャパン(株) 林 正弘 氏 (日本工業大学非常勤講師)	
12月15日	ものづくり先端技術セミナー	当センター/オンライン	1	102	70	理化学研究所 テラヘルツ光研究領域 大谷 知行 氏 同志社大学 理工学部 彌田智一 氏 横河電機(株) 岡田修平 氏 (株)アドバンテスト 加藤英志 氏	(公財) 京都技術科学センター
2月7日	ものづくり分析評価技術研究会	当センター/オンライン	1	127	73	関西学院大学 尾崎幸洋 氏 (株)右近工舎 右近寿一郎 氏 農研機構 池羽田晶文 氏 ウシオ電機(株) 五十嵐彩 氏 (株)日本分光 田村耕平 氏 (株)堀場アドバンステクノ 斧田拓也 氏(株) 相馬光学 大倉力 氏 横河電機(株) 中村幸弘 氏 クオリティデザイン 佐藤貴哉 氏	(公財) 京都技術科学センター
応用技術課							
4月12日	京都光技術研究会オープニングセミナー	当センター/オンライン	1	31	14	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中智子 氏 京都工芸繊維大学 井上純一 氏	京都光技術研究会
5月26日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	24	9	京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏	京都光技術研究会
5月30日	京都実装技術研究会	当センター/オンライン	1	55	39	国際技術ジャーナリスト・News&Chips編集 長・セミコンポータル編集長 津田 建二 氏	京都実装技術研究会
6月7日	表面処理技術研究会	当センター/オンライン	1	31	21	大藤課長、中村副主査、藤河技師、	鍍秀会
6月26日	光ものづくりセミナー	当センター/オンライン	1	40	23	電気通信大学 白川 晃 氏 京都大学 近藤 直 氏 (株)ミツトヨ 今橋 吉雄 氏 京都光技術研究会 山下 幹雄 氏	京都光技術研究会
7月4日	電磁波技術セミナー	当センター/オンライン	1	42	33	(一社)KEC関西電子工業振興センター 中山大介 氏 (一社)KEC関西電子工業振興センター 疋田修一 氏	
7月19日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	20	7	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中智子 氏	京都光技術研究会

実施日	名称	場所	回数	延人数	95WEB参加	講師	共催団体
7月20,21日	京都実装技術研究会	当センター	2	24	-	実装技研 河合 一男 氏 アントム(株) 浅野 光一 氏	京都実装技術研究会
8月31日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	21	5	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中智子 氏	京都光技術研究会
9月21日	食品・バイオ技術セミナー	当センター	1	29	-	コッチラボ(株) 市川吉徳 氏 ギフモ(株) 水野時枝 氏 京都府農林水産部流通・ブランド戦略課参事 村瀬 朗 氏	
10月10日	表面技術セミナー	オンライン/オンライン	1	82	77	群馬大学 教授 海野雅史 氏	
10月12日	京都実装技術研究会	当センター/オンライン	1	29	19	(株)ジャパンユニックス 酒川友一 氏 ユニテックジャパン(株) 嘉登浩一 氏	京都実装技術研究会
10月26日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	13	3	京都光技術研究会 山下 幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏	京都光技術研究会
11月2日	表面処理技術研究会	当センター	1	26	-	松延主任研究員、中村副主査	鍍秀会
11月16日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	20	4	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中 智子 氏	京都光技術研究会
12月19日	光ものづくりセミナー	当センター/オンライン	1	31	15	京都大学大学院 今堀 博 氏 大阪大学 塚本雅裕 氏 (株)島津製作所 西亮佑 氏 京都光技術研究会 山下幹雄 氏	京都光技術研究会
1月17日	電磁波技術セミナー	当センター/オンライン	1	87	59	アンリツ(株) 川内 清 氏	
1月19日	京都実装技術研究会 工場見学会	堀場製作所他	1	37	-		京都実装技術研究会
1月24日	食品・バイオ技術セミナー	当センター	1	61	-	渡辺製菓(株) 西下大輔 氏 (株)環境科学研究所 柏木隆頼 氏 京都府ものづくり振興課 御厨千晶 氏	
1月30日	実装技術スキルアップセミナー	ポリテクセンター	1	17	-	実装技研 河合 一男 氏 双和電機(株) 岩田 智寛 氏 双和電機(株) 岡本 和也 氏	京都実装技術研究会
1月31日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	21	5	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中智子 氏	京都光技術研究会
2月9日	京都実装技術研究会	当センター/オンライン	1	38	29	(株)クオルテック 植木竜佑 氏 (株)クオルテック 高橋政典 氏	京都実装技術研究会
2月27日	食品・バイオ技術セミナー	当センター	1	22	-	関西福祉科学大学 竹田竜嗣 氏	
3月6日	表面技術セミナー	当センター/オンライン	1	31	24	大阪府立大学 名誉教授 平井義彦氏	
3月19日	京都光技術研究会	当センター/オンライン	1	22	4	京都光技術研究会 山下幹雄 氏 京都工芸繊維大学 粟辻安浩 氏 神戸大学 的場 修 氏 同志社大学 田中智子 氏	京都光技術研究会
中丹技術支援室							
4/5,12,19	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	4	5	-		
4月4,6,11,13,18,20,25,27日	工業技術研修	中丹技術支援室	8	110	-		
5月9,11,16,18,23,25,30日	工業技術研修	中丹技術支援室	7	89	-		
5月16日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	1	1	-		
5月18日	製品開発企画研究会	丹後・知恵のものづくりパーク/オンライン	1	28	20	(株)積進設計部設計課 主査 小長谷節 氏 (株)日進製作所 産装技術部FAソリューション課 課長 奥村 大 氏	(公財)京都産業21北部支援センター
5月25日	製品開発企画研究会	中丹技術支援室/オンライン	1	26	21	(株)株式会社シゲノ 代表取締役 滋野兆崇 氏 日東精工(株)制御システム事業本部製造部部長 塩見友康 氏	(公財)京都産業21北部支援センター
6月14,21日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	2	15	-		
6月1,6,8,13,15日	工業技術研修	中丹技術支援室	5	77	-		
6月9,16,23,30日	品質管理(QO)講座	中丹技術支援室	4	282	-		
6月12,19,26日	産業人材育成基礎講座	中丹技術支援室	3	84	-		
7月18,20,25,27日	工業技術研修	中丹技術支援室	4	54	-		
7月7日	品質管理講座(基礎コース)	オンライン	1	71	71	MY中小企業診断士・技術士事務所 山口誠 氏	

実施日	名称	場所	回数	延人数	%WEB%	講師	共催団体
7月14,21,28日	品質管理講座(上級コース)	オンライン	3	117	117	(有)坂井経営技術研究所 坂井公一 氏	
7月3日	産業人材育成基礎講座(基礎講義)	オンライン	1	33	33	舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 准教授 七森公碩 氏	
7/13,20	産業人材育成基礎講座(実習)	中丹技術支援室	2	8	-	京都府中小企業技術センター 地域技術コーディネーター 北村泰之 氏	
7月27日	産業人材育成基礎講座(実習)	丹後・知恵のものづくりパーク	1	8	-	京都府中小企業技術センター 地域技術コーディネーター 北村泰之 氏	
8月2,23日	デジタルマニファクチャリング研究会	高速開発支援センター	2	2	-		
9月1,8,10,22,24,29,31日	工業技術研修	中丹技術支援室	7	88	-		
8月4日	品質管理講座(上級)コース	オンライン	1	42	42	(有)坂井経営技術研究所 坂井公一 氏	
8月3日	産業人材育成基礎講座(実習)	丹後・知恵のものづくりパーク	1	8	-	京都府中小企業技術センター 地域技術コーディネーター 北村泰之 氏	
8月21,28日	産業人材育成基礎講座(実習)	中丹研修室	2	8	-	京都府中小企業技術センター 地域技術コーディネーター 北村泰之 氏	
9月6,23日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	2	4	-		
9月14日	IoTオープンセミナー	オンライン	1	41	41		
9月22,29日	IoT実習セミナー(アルディーノ講座)	中丹技術支援室	2	23	-		
9月5,7,12,14,21,26,28日	工業技術研修	中丹技術支援室	7	92	-		
10月3,12,17,19,24,26,31日	工業技術研修	中丹技術支援室	7	84	-		
10月5日	IoT実習セミナー(アルディーノ講座)	中丹技術支援室	1	8	-	坂井経営技術研究所 坂井公一 氏	
10月16,23,30日	IoT実習セミナー(ラズパイ講座)	中丹技術支援室	3	28	-	舞鶴電脳工作室(合同) 代表 町田秀和 氏	
10月25日	機器操作・活用セミナー(蛍光X線分析装置)	中丹技術支援室	1	5	-		
10月25日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	1	1	-		
10月26日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室/オンライン	1	23	15	(株)IDAJ 技術フェロー 石川覚志 氏	
11月2日	機器操作・活用セミナー(走査電子顕微鏡)	中丹技術支援室	1	3	-		
11月2,7,9,14,16,28,30日	工業技術研修	中丹技術支援室	7	89	-		
11月6日	IoT実習セミナー(ラズパイ講座)	中丹技術支援室	1	10	-	舞鶴電脳工作室(合同) 代表 町田秀和 氏	
11月9日	機器操作・活用セミナー(三次元光学プロファイラー)	中丹技術支援室	1	5	-		
11月16日	機器操作・活用セミナー(3次元スキャナー)	中丹技術支援室	1	4	-		
11月22日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	1	1	-		
11月30日	新分野進出支援講座	中丹技術支援室/オンライン	1	60	60	福知山公立大学情報学部教授 畠中利治 氏	
12月5,7,12,14日	工業技術研修	中丹技術支援室	4	49	-		
12月7日	新分野進出支援講座	中丹技術支援室/オンライン	1	60	60	福知山公立大学情報学部教授 畠中利治 氏	
12月21日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	1	3	-		
1月6,8,23,30日	工業技術研修	中丹技術支援室	4	43	-		
1月17,24,31日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	3	5	-		
2月7,14,21,28日	デジタルマニファクチャリング研究会	中丹技術支援室	4	4	-		
2月1,6,8,15,20,22,27,29日	工業技術研修	中丹技術支援室	8	82	-		
3月5,7,12,14,26,28日	工業技術研修	中丹技術支援室	6	68	-		
3月7日	新分野進出支援講座	中丹技術支援室/オンライン	1	22	22		

実施日	名称	場所	回数	延人数	3%WEB参加	講師	共催団体
けいはんな分室							
7月5日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	48	-	京都大学 エネルギー理工学研究所 八木重郎 氏 西原大志 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会・(公財)京都産業21・京都大学エネルギー理工学研究所・京都やましろ企業オンリーワン倶楽部・宇治市
10月17日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	41	-	京都大学 生存圏研究所 矢野浩之 氏 横山竜宏 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会・(公財)京都産業21・京都大学生存圏研究所・京都やましろ企業オンリーワン倶楽部・宇治市
12月6日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	40	-	京都大学防災研究所 伊藤 耕介 氏 山田 真澄 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会・(公財)京都産業21・京都大学防災研究所・京都やましろ企業オンリーワン倶楽部・宇治市
2月27日	けいはんな技術活用研究会	KICK会議室	1	11	-	アイ・シー・アイデザイン研究所 飯田 吉秋 氏 黒田 弥生 氏	(公財)京都産業21
2月20日	京都大学宇治キャンパス産学交流会	京都大学 宇治キャンパス	1	48	-	京都大学化学研究所 時田 茂樹 氏 岡崎 大樹 氏	京都大学宇治キャンパス産学交流企業連絡会・(公財)京都産業21・京都大学化学研究所・京都やましろ企業オンリーワン倶楽部・宇治市

# 依頼試験手数料・機械器具貸付料の特例措置について

## ◆ 料金体系

依頼試験の手数料及び機械器具の貸付料については、京都府手数料徴収条例及び京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則により定めておりますが、以下のとおり、特例措置を実施しております。

### ○ 依頼試験等の申込みを行う事業所の所在地

京都府内 <sup>1)</sup> 中小企業者	京都府内 中小企業者以外	関西広域連合内 <sup>2)</sup>	その他の都道府県 <sup>3)</sup>
基本額から 2割減額	基本額	基本額	基本額の 5割増し

※ただし、京都府内に本社（主たる事務所又は事業所）がある場合は、京都府内事業所からの申し込みとして取り扱います。

例：本社が京都府内にある場合、滋賀県の工場からの申込みでも、京都府内の事業所からの申込みとして取り扱います。  
中小企業であれば、料金は基本額から2割減額になります。

### 1) 京都府内中小企業者

京都府内中小企業者の基本額から2割減額の料金は、令和9年3月31日までの限定措置です。

「中小企業者」とは…  
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する中小企業者のことをいいます。  
【製造業の場合】 資本金の額3億円以下又は従業員数300人以下

### 2) 関西広域連合域内企業

京都府外の企業については、基本額の5割増しの料金に設定しておりますが、関西広域連合域内企業は、割増料金なしの基本額でご利用いただけます。

対 象： 滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県の企業

### 3) その他の都道府県の企業

その他の都道府県の企業については、基本額の5割増しの料金に設定しておりますが、下記の試験等については、国から貸付けを受けた機器を使用しているため、割増料金なしの基本額でご利用いただけます。

対象依頼試験： ラマン分光（分光分析）、マイクロフォーカスX線CT（非破壊試験）  
対象貸付機器： レーザーラマン顕微鏡、マイクロフォーカスX線CT

## ◆ 消費税及び地方消費税の取り扱いについて

依頼試験手数料及び機器貸付料に消費税相当額を含みます。

# 依頼試験の項目一覧

<分析>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類	小分類			
中分類	小分類			
<b>化学分析</b>				
食品	水分	1 成分	2,040	
	灰分	1 成分	2,040	
	粗たんぱく	1 成分	2,550	
	粗脂肪	1 成分	2,550	
	その他	1 成分	2,550	
金属・その他		1 成分	2,550	
<b>分光分析</b>				
赤外分光	定性(通常分析)	1 件	5,100	
	定性(顕微分析)	1 件	7,140	
I C P 発光分光	定性	1 件	16,320	
	定量	1 成分	2,550	
色差測定		1 件	2,040	
顕微紫外・可視・近赤外分光	定性	1 件	3,570	
	定量	1 件	3,570	
蛍光測定	定性	1 件	2,040	
ラマン分析	定性	1 件	6,320	※他府県割増適用外
分光エリプソメトリ		1 件	8,670	1 試料 1 時間まで
テラヘルツ非破壊検査		1 件	14,280	1 試料 1 時間まで
<b>クロマト分析</b>				
液体クロマトグラフ	定性	1 件	6,120	
	定量	1 件	7,140	
高速液体クロマトグラフ	定性	1 件	16,000	
	定量	1 件	20,000	
イオンクロマトグラフ	定性	1 件	5,400	
	定量	1 件	7,030	
液体クロマトグラフ質量分析	定性	1 件	9,380	
<b>X線分析</b>				
X線回折		1 件	5,100	
蛍光 X 線	定性	1 件	8,400	
	定量	1 成分	4,200	
残留応力測定		1 件	9,480	
<b>熱分析</b>				
示差熱	定性	1 件	5,100	
熱膨張		1 件	6,120	
熱重量		1 件	5,100	
示差走査熱量		1 件	5,100	
熱機械		1 件	5,100	
熱伝導率		1 件	11,220	
<b>表面分析</b>				
微小 X 線分析	X線像	1 成分	10,200	マッピング
	線分析	1 成分	10,200	
	点分析(定性)	1 件	16,320	
	成分増し	1 成分	2,040	
X線光電子分光分析	スペクトル分析	1 件	27,540	
	深さ方向分析加算(イオン銃)	1 件	10,200	1 時間ごとに
	深さ方向分析加算(ガラスクラスターイオン銃)	1 件	13,260	1 時間ごとに
	面分析加算	1 件	10,200	1 時間ごとに
オージェ電子分光分析	スペクトル分析	1 件	22,440	
	深さ分析加算	1 件	11,220	
	オージェ電子像加算	1 件	11,220	
	オージェ電子像成分増し	1 成分	5,610	
グロー放電発光分析	表面分析	1 件	3,870	
	深さ分析	1 件	7,650	
ナノサーチ複合型顕微鏡観察	レーザー顕微鏡観察	1 件	3,300	1 試料 1 時間まで
	レーザー+プローブ顕微鏡観察	1 件	6,500	1 試料 1 視野から 1 時間まで

# 依頼試験の項目一覧

## <電気試験>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類	中分類			
<b>電気試験</b>				
	絶縁抵抗測定	1件	1,530	
	オシログラフ波形観測	500MHz 以上	1,530	
		500MHz 未満	200	
	インピーダンスゲインフェイズ測定	1件	1,120	
	広範囲インピーダンス測定	1件	3,060	
	低抵抗率測定	1件	300	
<b>EMC 測定</b>				
	入力インパルス雑音試験	1件	3,260	2時間までごとに
	シールド材特性試験	1件	4,280	1測定ごとに
	静電気放電測定	1件	1,530	2時間までごとに
	サージ免疫試験	1件	2,550	2時間までごとに
	ファーストランジェントバースト試験	1件	2,550	2時間までごとに
	伝導性雑音電磁界測定	1件	13,260	1測定ごとに
	放射性雑音電磁界測定	1GHz まで	14,280	1測定ごとに
		1GHz から 6GHz	16,320	1測定ごとに
	伝導性電磁界免疫試験	1件	12,240	1測定ごとに
	放射性電磁界免疫試験	1GHz まで	10,200	1測定ごとに
		1GHz から 2.5GHz	11,220	1測定ごとに
	低周波エミッション測定	1件	10,200	1測定ごとに
	低周波免疫試験	1件	10,200	1測定ごとに
	電磁波妨害評価試験(G-TEM)	エミッション測定	6,420	1測定ごとに
		免疫試験	11,220	1測定ごとに
<b>光・マイクロ波・ミリ波測定</b>				
	光コンポーネント測定	1件	5,610	1測定ごとに
	マイクロ波・ミリ波ネットワーク測定	1件	6,120	1測定ごとに
	光オシロスコープ測定	1件	2,140	1測定ごとに
	光スペクトラム測定	1件	1,020	1測定ごとに
	全光束測定	大型積分球使用	5,810	1測定ごとに
		小型積分球使用	5,200	1測定ごとに
	配光測定	可視光	6,830	1測定ごとに
		近赤外光	6,630	1測定ごとに

## <精密測定>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考
大分類	中分類			
<b>寸法測定</b>				
	角度測定	1件	1,220	
	長さ測定	内・外径	1,220	
		その他	1,220	
<b>形状測定</b>				
	真直度	1m未満	2,040	
	表面粗さ	二次元測定	2,950	
		三次元測定	11,220	50ラインまで
		三次元測定(測定ライン加算)	2,240	10ラインごとに
	輪郭形状	数値データ	5,300	1断面単位
		二次元解析	4,080	
		三次元解析	11,220	50ラインまで
		三次元解析(測定ライン加算)	2,240	10ラインごとに
	真円度	1件	2,040	
	平面度	1件	3,160	
	円筒度	1件	3,260	
<b>データ入力</b>				
	CNC 三次元測定		3,260	50点まで
		入力点数増し	610	10点までごとに

# 依頼試験の項目一覧

## <材料試験>

区分		単位	手数料 基本額 (円)	備考	
大分類	中分類				小分類
<b>強度試験</b>					
引張		1 件	1,530		
	(耐力加算)	1 件	760		
	恒温槽仕様	1 件	3,060		
圧縮		1 件	1,530		
	恒温槽仕様	1 件	3,060		
曲げ		1 件	1,530		
	恒温槽仕様	1 件	3,060		
荷重		1 件	2,550		
	恒温槽仕様	1 件	4,180		
ねじり		1 件	1,530		
	恒温槽仕様	1 件	3,060		
疲労		1 件	9,890	1 試料 1 時間まで	
	(時間加算)	1 件	4,890	1 時間までごとに加算	
	恒温槽仕様	1 件	11,220	1 試料 1 時間まで	
	恒温槽仕様(時間加算)	1 件	5,910	1 時間までごとに加算	
<b>硬さ試験</b>					
ブリネル		1 件	1,530		
	硬さ分布加算	1 件	1,220		
ロックウェル		1 件	1,530		
	硬さ分布加算	1 件	1,220		
ビッカース		1 件	2,040		
	硬さ分布加算	1 件	1,220		
<b>摩耗試験</b>					
往復運動式		1 件	4,080		
動摩擦摩耗試験		1 件	4,080		
<b>金属組織試験</b>					
顕微鏡		1 件	3,060		
<b>電子顕微鏡試験</b>					
二次電子観察		1 件	8,160		
反射電子観察		1 件	8,160		
視野増し		1 件	1,220		
元素分析	定性	1 件	10,200		
<b>非破壊試験</b>					
X線透過(工業 X 線透視)		1 件	3,570		
マイクロフォーカス X 線 CT		1 件	8,160	1 測定ごとに ※他府県割増適用外	

# 依頼試験の項目一覧

<その他>

大分類		区分	単位	手数料 基本額 (円)	備考
中分類	小分類				
<b>環境試験</b>					
腐食試験(塩水噴霧)			1件	2,040	24時間まで
		時間超過	1件	660	24時間ごとに
腐食試験(複合サイクル)			1件	910	1時間までごとに
耐候性試験		キセノン耐候性試験	1件	1,930	1時間までごとに
		メタルハライド耐候性試験	1件	1,830	1時間までごとに
温湿度組合せ試験(800L)			1件	2,950	2時間まで
		時間超過	1件	1,220	1時間までごとに
温湿度組合せ試験(300L)			1件	2,850	2時間まで
		時間超過	1件	1,220	1時間までごとに
温度組合せ試験(60L)			1件	1,220	2時間まで
		時間超過	1件	510	1時間までごとに
ヒートショック試験			1件	2,600	1時間までごとに
<b>理化学試験</b>					
金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定			1件	3,060	
熱特性の測定			1件	4,080	
電磁法による膜厚測定			1件	1,020	
渦電流法による膜厚測定			1件	1,020	
蛍光 X 線による膜厚測定			1件	2,040	
薄膜付着強度試験			1件	3,060	
粒子径分布測定(バッチ式セル測定)			1件	1,930	
<b>微生物試験</b>					
培養			1件	2,550	
<b>食品物性測定</b>					
テクスチュロメーターによる測定			1件	1,530	
レオメーターによる測定			1件	1,530	
食品水分活性の測定			1件	1,020	
<b>食品乾燥試験</b>					
噴霧乾燥試験			1件	3,770	450g までごとに
凍結乾燥試験			1件	3,770	450g までごとに
その他			1件	3,770	450g までごとに
<b>食品加工試験</b>					
食品加圧試験			1件	1,120	
<b>積層造形</b>					
			1件	7,650	1時間までごとに
<b>試料調整</b>					
試料埋込み			1件	1,020	
試料切断			1件	1,020	
ナノサーチ複合型顕微鏡観察	回転式マイクローム加工		1件	10,000	1 試料 1 時間まで 1 件とは 1 試料単位とする

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## <精密測定検査用>

※貸付料基本額は 1 時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
CNC三次元座標測定機	LeitzPMM-C12.10.7	HexagonMetrology GmbH	測定範囲：X = 1,200mm、Y = 1,000mm、Z = 700mm 空間精度：(0.6+L/800)μm (L：測定長さ mm) プロービング精度 = 0.6μm スキャンング精度 = 1.5μm/45 秒	2011	基盤技術課	依頼試験のみ	複雑形状部品の精密計測
曲面微細形状測定システム(接触式測定)	フォームタリサーフ PGI 1200	アメテックス(株)テレーホブソン事業部	測定範囲：X = 120mm、Y = 100mm、Z = 12.5mm 測定分解能：0.8nm(Z方向) システムノイズ：2nm (Rq)以下	2014		4,480	表面粗さ・輪郭形状の測定
曲面微細形状測定システム(非接触式測定)	VR-3200	キーエンス	観察測定範囲：24×18mm ~ 1.9×14mm(連結可能) 電動 XY ステージ(移動量：184mm×88mm)			1,120	表面粗さ・輪郭形状の測定
レーザプローブ式非接触三次元測定装置	NH-3SP	三鷹光器	測定範囲 X, Y : 150mm、Z : 10mm 測定分解能 X, Y : 0.01μm、Z : 0.001μm 測定精度 X, Y : 0.5 + 2.5L/1,000μm、Z : 0.1 + 0.3L/10μm (L : 測定長さmm)	2009		3,770	微細部品の非接触での形状観察・評価
精密真円度・円筒形状測定機	タリロンド 595	アメテックス(株)テレーホブソン事業部	最大測定径：Φ350mm 外周面最大測定高さ：500mm 内周面最大測定深さ：160mm 回転精度： (0.01 + 3H/10,000) μm (H : 測定高さ mm) ゲージ分解能： ±1mm 範囲/0.008μm、 ±0.04mm 範囲/0.0003μm 積載荷重：40kg	2013		5,610	精密部品の真円度・真直度測定
画像測定機	Smart ScopeVantage 600	O G P	測定範囲： X = 450mm、Y = 610mm、Z = 300mm 測定精度【画像処理計測時】： XY U2 = (1.5 + 4L/1,000)μm Z U1 = (2.5 + 5L/1,000)μm (L : 測定長さmm) 倍率：33.0~357 倍(20 インチ液晶画面上) 測定プローブ：画像プローブ(CCD カメラ)、レーザプローブ、接触式プローブ	2007		4,480	精密部品の光学測定
投影機	VS-300	神港精機	測定倍率：100 倍、50 倍、20 倍、10 倍、5 倍 作動範囲：100mm×50mm(マグネスケール付) スクリーンのサイズ：Φ300mm	1989		250	光学形状測定

## <材料試験用（その1）>

※貸付料基本額は 1 時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
万能材料試験機	UCT-25T	オリエンテック	最大荷重：250kN	1989	基盤技術課	1,930	材料強度試験(引張・圧縮・荷重)
	UH-1000kNI	島津製作所	最大荷重：1000kN	2010		3,060	
	E10000LT	インストロン	引張/圧縮 ±10kN ねじり ±100Nm	2014		4,890	材料の疲労強度試験 部品の耐久性評価
			恒温槽仕様 温度範囲 -30~200℃			5,910	
	68TM-30E2F2	インストロン	最大荷重：30kN 恒温槽仕様 温度範囲 -40~250℃	2021		3,700	材料強度試験 (引張・圧縮・3点曲げ)
接触式伸び計、非接触式ビデオ伸び計			850 ※加算				
万能材料試験機用 3D-DIC	VIC-3D	Correlated Solutions	計測範囲：50X50~500X500mm	2021	1,300	非接触 3 次元での変形計測、ひずみ解析	
万能材料試験機用 ハイスピードカメラ	FASTCAM Nova S6	フォトロン	最高撮影速度：6,400fps(1024X1024 画素時) 800,000fps(128X16 画素時)・	2021	1,500	破壊や破談の瞬間映像撮影	
ナノインデンテーション試験機	ENT-2100	エリオニクス	荷重範囲：5μN~100mN 変位計測範囲：~50μm 試料サイズ：直径 50mm×厚さ 10mm(最大) その他： バーコピッチ圧子、球状圧子 R100μm、 平面圧子 □20、□100μm	2013	1,830	蒸着・塗装・めっき・DLC 等 薄膜の硬さ物性評価	

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## ＜材料試験用（その2）＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
マイクロピッカー 硬さ試験機	HMV2000AD	島津製作所	試験荷重： 0.049(5gf)～19.6N(2000gf)までの11段階 モニター表示による自動測定 曲面自動補正機能付き	1997	基盤 技術課	250	金属の微小部硬さ測定
デジタルロックウェル 硬さ試験機	ARD 型	アカシ	圧子：ダイヤモンド・超硬球	1980		200	ロックウェル硬さの測定
マイクロフォーカス X線CT	TOSCANCSR-3 2300?FD	東芝 IT コントロールシ テム	X線発生器：電圧 230 k V / 焦点サイズ：4μm 検出器：8 インチフラットパネルディテクタ 搭載可能サイズ：Φ320×H300mm / 15kg 最大スキャンエリア：Φ260×300mm 高画質が得られるフラットパネルディテクタを搭載 空間分解能：5μm	2014	応用 技術課	4,080	マイクロフォーカス X 線 CT 試験 ※他府県割増適用外
広範囲荷重摩耗 試験機	NUS-ISO-3	スガ試験機	往復速度：毎分 40 回 摩耗面積：30×12mm 摩耗輪寸法：直径 50mm 幅 12mm 荷重範囲：0.98～29.42 N ±0.05 N 試験片寸法：最小 30×50mm～最大 70×300mm 厚さ最大 4mm	1994	応用 技術課	100	往復運動方式による 摩耗試験

## ＜電気試験用（その1）＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
電磁波妨害評価 試験装置(G-TEM) (EMission測定)	GTEm 750,N9010A-5 07,A009K251-5	TESEQ,Keysight	EMission測定 放射性EMission測定 30MHz～6GHz 雑音端子電圧測定 9kHz～30MHz 妨害電力測定 30MHz～300MHz	2016	応用 技術課	3,160	製品から放出される 電磁ノイズの測定
電磁波妨害評価 試験装置(G-TEM) (Immunity試験)	757R,A080M10 2-5757R,GA70 1M282-4850R- LCA など	Technologies,アールア ンドケーなど	Immunity試験 放射性Immunity試験 100kHz～1GHz 200V/m まで 80MHz～2.7GHz 10V/m まで BCI 法Immunity試験 1MHz～1GHz 200mA まで 伝導性Immunity試験 150kHz～80MHz?10V まで			5,710	製品へ電磁ノイズを印加する 耐性試験
サンプリング オシロスコープ (86100D)	86100D	アジレントテクノロジー	測定範囲 光：DC～65GHz 電気：DC～80GHz における時間応答特性 TDR による線路インピーダンス(シングルエンド、差動線 路)特性	2013	応用 技術課	2,340	光・マイクロ波の線路評価
ミックスドシグナル オシロスコープ	MSO70804	テクトロニス	周波数帯域：8GHz アナログチャンネル：4ch、デジタルチャンネル：16ch メモリ長さ：125M、 サンプリングレート：最大 25GS/s アイパターンチェック、ジッター成分解析が可能	2014		1,530	アナログ・デジタルの 電気信号波形の観測
オシロスコープ	MDO3054	テクトロニス	周波数帯域：500MHz アナログチャネ：4ch メモリ長さ：10M、サンプリングレート：最大 2.5GS/s スペクトラムアナライザの機能搭載(9 kHz～500MHz)			200	アナログ電気波形（対時間 又は周波数）の観測
光コンポーネント アナライザシステム (N4375D)	N4375D	アジレントテクノロジー	・測定周波数範囲 0.01～26.5GHz ・4ポート S パラメータ測定 ・光ポート 波長 1310 nm、1550 nmとの併用による O/E, E/O 周波数特性評価	2013	応用 技術課	5,610	マイクロ波帯での周波数特性 評価、光デバイスの周波数 特性評価
ベクトルネットワーク アナライザ (ME7838A)	ME7838A	アンリツ	・測定周波数範囲 70kHz～110GHz ・2ポート S パラメータ測定 ・アンテナ近傍界測定 / 遠方界変換評価(18～ 110GHz) ・フリースペース法による透過 / 吸収特性(18～ 110GHz)			8,770	マイクロ波・ミリ波帯域での周 波数特性評価、アンテナ指 向特性評価、材料特性評 価
光スペクトラム アナライザ (AQ6370C(Z))	AQ6370C(Z)	横河メータ&インスツル メンツ	・測定波長範囲 600～1,700 nm ・光ファイバー入力(FCコネクタ) ・基準光源内蔵			610	発光スペクトル測定評価、 光透過波長特性評価
電磁波シールド特性 測定システム (N9000A)	N9000A	アジレントテクノロジー	・測定周波数範囲 9kHz～3GHz (KEC 法では 100kHz～1GHz) ・トラッキングジェネレータ内蔵 (100kHz～3GHz) ・信号増幅器			510	電磁波のスペクトル 測定評価

# ご利用いただける機器一覧（本所）

<電気試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
光学特性評価システム (大型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	・積分球による全光束測定(φ76インチ、φ10インチ) ・配光測定(最長光路 12m、波長範囲：380nm～2500nm)	2015		5,810	照明器具の全光束測定
光学特性評価システム (小型積分球使用)						5,200	発光デバイスの全光束測定
光学特性評価システム (可視光配光ユニット使用)						5,400	光源の可視光域の配光測定
光学特性評価システム (近赤外光配光ユニット使用)						5,200	光源の可視光域・近赤外域の配光測定
低抵抗率計	ロレスター-GPMPV-T610	三菱化学アナリテック	測定範囲：9.999×10 <sup>-3</sup> ～9.999×10 <sup>7</sup> Ω 測定方法：直流4深針法	2011		150	電磁波シールド材などの抵抗材料の評価
光デバイス用自動光軸調整装置	U4224	駿河精機	光デバイスと入・受光ファイバーのXYZ軸と光軸方向の入射角θzの4軸自動調芯機能 光デバイスと入・受光ファイバーのθX、θYの手動2軸微調芯機能 調芯位置の変位・時間変動に対する受光量モニタ機能 調芯精度 XYZ軸：0.1μm 入射角θXθYθZ：0.1度 UV樹脂によるデバイスと光ファイバーの固定機能	1998	応用技術課	1,020	光導波路デバイスとファイバー等の光軸調整
高精度マスクアライメント装置	MA-20K型	ミカサ	最大基板サイズ：φ4インチ、2mm アライメント精度：1.2μm(20倍対物レンズ) マニピュレータ：X・Y±5mm、Z4mm 露光用タイマー：積算光量カウンター式			1,120	光導波路デバイスの導波路と電極パターンの作成
超精密研磨機	1 超精密ラッピングポリッシング装置(PM5MA-20K型) 2 ダイヤモンドデスクソ-(モデル15)	丸本ストルアル	試料径 3インチまで 表面あらさ 最大 0.2nm(平均)程度 平坦度 最大 1/10λ(直径3インチウエハ時)程度 平行度 最大 2秒角(2/3600度)程度 取り付け可能資料大きさ 25mm×10mm～20mm×6mm 端面研磨精度調整範囲 ±3.0° 切断可能試料径 3インチまで 切断可能試料厚み 最大 50mm程度			1,220	ウエハ表面と光ファイバー端面の研磨
真空蒸着装置	EBH-6	日本真空技術	真空排気装置：DP 加熱源：抵抗加熱 試料：固定式 10cm角まで	1981		660	薄膜作成
赤外線熱画像装置	TVS-200Mk IIS T	日本アビオニクス	温度測定範囲：-20℃～2000℃ 探知波長帯：3～5.4μm 最小検知温度差：0.1℃(黒体温度 30℃) 温度測定精度：±0.4℃ 検出器冷却方式：ターリングクーラー冷却 測定距離 20cm～∞ 測定視野角 15°(水平)×10°(垂直) フレームタイム：30フレーム/s	1996	企画連携課	1,830	あらゆる物体の表面温度分布状況の測定

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## <顕微鏡及び試料作製装置>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
倒立型金属顕微鏡	GX51/DP72	オリンパス	明視野 / 暗視野 / 微分干渉 / 簡易偏光 ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 ×10 / 視野数 22 1280 万画素 BMP / TIFF / JPEG / JPEG2000 / AVI / PNG / VSI / PSD 鋳鉄解析(黒鉛球状化率、フェライト / パーライト率)、 粒子解析	2010	基盤 技術課	860	金属組織の観察
分析型 走査電子顕微鏡 (観察のみ)	JSM-7100F	日本電子	電子銃：ショットキー 対物レンズ：アウトレンズ型 表示倍率：×10～1,000,000 加速電圧：0.2kV～30kV 照射電流：数 pA～200nA 次電子分解能：1.2 nm(30kV) 3.0 nm(1.0kV) 最大試料寸法：100mmΦ×40mm t 試料ステージ：X-70mm Y-50mm Z-3～41mm 傾斜 -5～70° 回転 360° 元素分析(EDS)：検出元素(Be～U) 定性・定量・マッピング機能	2014		4,380	各種材料の微細構造の 高倍率観察及び元素分析
分析型 走査電子顕微鏡 (観察+元素分析)						5,610	
走査電子顕微鏡	JSM-6701F	日本電子	電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 二次電子像分解能：1 nm(15kV) 2.2 nm(1kV) 反射電子像分解能：3 nm(15kV) 表示倍率：25～650,000 倍 加速電圧：0.5～30kV 試料ステージ：5 軸モーター駆動ステージ X-Y：70×50mm、回転：360° 作動距離：1.5～25mm、傾斜：-5～+60°	2006		3,360	各種材料の微細構造の 高倍率観察
ナノサ-チ複合型顕微鏡 (レーザー顕微鏡)	SFT-4500	島津製作所	レーザー顕微鏡部 (LSM) 光源：405nm 半導体レーザー 総合倍率：108～17,280 倍 Z 軸最大ストローク：76mm XY ステージ：100×100mm プローブ顕微鏡部 (SPM) 光源：659nm 半導体レーザー 変位検出系：光てこ方式 最大走査範囲：X-Y：100×100μm Z：25μm 動作モード：コンタクト、ダイナミック、位相、電流、 表面電位 (KFM)、磁気力 (MFM)	2019	応用 技術課	3,300	数十 nm の段差計測、試料 表面の粗さ測定、複数のパターンの 形状解析、試料の物性解析など ・レーザー顕微鏡による広域 形状観察 ・プローブ顕微鏡による精密 形状観察 ・物性解析（位相変化による 硬さ評価、磁気情報、電 流分布、表面電位）
ナノサ-チ複合型顕微鏡 (レーザー+プローブ顕 微鏡)						6,500	
ナノサ-チ複合型顕微鏡 (試料調整) ※1						2,000	
モニタリングシステム	KH-2200	ビジネスリンクス	撮影素子：H570×V485 解像度：H360 本以上、V350 本以上 S/N：46DB 色温度：3100°K(MAX) カラービデオプリンター：昇華熱転写型 プリント画素数：720×468 プリント階調：3 原色 256	1990		510	光軸可変実体観察
精密ダイヤモンド バンドソー	BS-300CL	メイワフォーシス	バンド厚さ：200μm	2014	基盤 技術課	1,020	分析試料の前加工

※1 切削刃は、機器借受者が持参してください。

## <分析用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
波長分散型蛍光 X 線 分析装置	ZSX PrimusIV	リガク	定性分析、定量分析、薄膜分析、微小部分分析、マッピング分析が可能 測定範囲：Be ～Cm 試料サイズ：最大φ50mm×30mm(h) (試料ホルダーに設置可能なもの)	2022	基盤 技術課	5,600	工業材料中の元素の定性 分析及び定量分析
ハンドヘルド蛍光 X 線 分析装置	NitonXL2-Plus	Thermo Fisher Scientific	切断が困難な大型金属試料などの分析が可能 測定範囲：Mg～Bi 測定径：φ8mm	2022		1,000	工業材料中の元素の定性 分析

# ご利用いただける機器一覧（本所）

<分析用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
X線回折装置	RINT-UltimaⅢ	リガク	集中法、平行ビーム法、薄膜斜入射、極点図、X線小角散乱の各測定に対応 Cu管球(40kV,40mA) 測角範囲：0°~130°(2θ)	2004	応用技術課	3,970	工業材料の結晶解析
炭素硫黄分析装置	CS-844	LECO	高周波誘導加熱-酸素気流中燃焼-非拡散赤外吸収法 測定範囲：炭素：0.6ppm~6.0% 硫黄：0.6ppm~6.0%(いずれも試料量は1g程度)	2011	基盤技術課	2,550	金属材料中の炭素及び硫黄の定量分析
ICP発光分光分析装置	SPS3100(24HV UV)	エスアイアイ・ナノテクノロジー	シーケンシャル型(2チャンネルタイプ) 検出下限値：10ppb以下(鉛) 波長範囲：130~770nm 塩素(134.724nm)からカリウム(766.491nm)までの元素が測定可能	2008	依頼試験のみ		金属等に含まれる元素の定性分析・定量分析
フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)	FT/IR-6XFVST IRT-7100-16	日本分光	分解能：0.25cm <sup>-1</sup> スペクトル波数：7800~30cm <sup>-1</sup> 測定方法：ATR法、透過法、反射法、拡散反射法、高感度反射法  赤外顕微鏡：ATR法、透過法、反射法	2023	基盤技術課	2,300	有機化合物の定性分析・定量分析
フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) (赤外顕微鏡)						4,200	
レーザーラマン顕微鏡	RAMAN touch	ナノフoton	レーザー波長：532nm、785nm 対物レンズ：5、10、20、50、100倍 回折格子：300、600、1200gr/mm 検出器：電子冷却 CCD(1340×400画素)	2013	応用技術課	2,040	有機・無機化合物の定性分析 ※他府県割増適用外
分光エリプソメータ	UVSEL2	堀場製作所	光源 150Wキセノンランプ 波長範囲 190~2100nm 分光器・検出器 ・FUV-Vis：ダブルモノクロメータ・PMT検出器 ・NIR：シングルモノクロメータ・InGaAs検出器 ゴニオメータ 35~90° 試料ステージ 200×200×H30mm 最少スポットサイズ 35×85μm (70°)	2017	応用技術課	8,670	薄膜材料の光学特性評価
テラヘルツ非破壊検査装置	TAS7500TS	アドバンテスト	測定周波数範囲 分光測定：0.5~7THz 分光イメージング測定：0.1~4THz 測定モード 分光測定：透過、反射、ATR 分光イメージング測定： 透過、反射(150mm×150mm) SN比 分光測定：57dB以上 分光イメージング測定：60dB以上 スキャンレート 16ms、8ms、1ms ホルダ制御温度範囲 室温~300℃(透過測定のみ)	2018	基盤技術課	10,200	材料の異方性評価、異物観察、膜厚測定
顕微紫外可視近赤外分光光度計	MSV-5200 DGK	日本分光	測定：透過測定、反射測定 波長範囲：200~2700nm 試料ステージ：移動範囲：X78mm、Y52mm、Z25mm カセグレン鏡：16倍、32倍 対物レンズ：10倍、20倍、50倍 測定アパーチャ径：Φ10μm~Φ200μm(16倍カセグレン鏡) Φ5μm~Φ100μm(32倍カセグレン鏡)	2014	応用技術課	3,570	材料の微少部位の分光分析
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	光源：150Wキセノンランプ 測定波長範囲：200~750nm及び0次光 感度：S/N800以上(RMS) S/N250以上(Peak to Peak) 試料形態：液体・粉体・フィルム等 3次元測定・時間変化測定が可能	2013	基盤技術課	610	液体・粉体・フィルム等の蛍光測定
蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	上方蛍光測定および下方蛍光測定を選択可能 ダブルモノクロメータ方式で200~900nmから最適な励起・蛍光波長での測定可能 測定間隔・測定回数が設定可能 6~384ウェルプレートに対応 簡単操作でエクセル形式のレポート出力		応用技術課	810	マイクロプレート上の液体サンプルの蛍光測定
測色色差計	SQ2000	日本電色工業	測色範囲：380nm~780nm(10nm間隔) 特徴：正反射光の受光可能、拡散反射光のみの測定可能 出力：Lab ΔLab ΔE, L*a*b*, ΔL*a*b*, E*, YI W, WB, ΔYI ΔW ΔWB XYZ xy, 反射率など	2001	基盤技術課	300	材料・塗装面等の色度の測定

# ご利用いただける機器一覧（本所）

<分析用（その3）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	上方蛍光測定および下方蛍光測定を選択可能 ダブルモノクロメータ方式で200~900nmから最適な励起・蛍光波長での測定可能 測定間隔・測定回数が設定可能 6~384ウェルプレートに対応 簡単操作でエクセル形式のレポート出力		応用技術課	810	マイクロプレート上の液体サンプルの蛍光測定
ガスクロマトグラフ	GC-17A	島津製作所	キャピラリーカラム専用タイプ 検出器：水素炎イオン化検出器	1996	応用技術課	560	食品中の香気成分等の分析
液体クロマトグラフ	Prominence	島津製作所	高圧、グラジエントタイプ 検出器：紫外可視、蛍光検出器	2005		910	食品中のアミノ酸等の分析
高速液体クロマトグラフ	Nexera XR	島津製作所	送液ポンプ：流量設定範囲0.0001~10mL/min オートサンブラ：注入量設定範囲0.1~50μL カラムオープン：室温-10~85℃ 検出器：蛍光、電気伝導度、示差屈折率、フोटダイオードアレイ	2022		3,800	栄養成分、残留農薬、香粧品成分、化粧品添加物、水道水質、環境汚染物質等の分析
飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-TOF/MS)	micrOTOF2-kp	ブルカー・ダルトニクス	イオン化法：ESIもしくはAPCI 質量範囲：50~20,000 m/z 質量分解能：16,500 FWHM以上	2011	応用技術課	4,890	食品等に含まれる成分の組成式（元素組成）の推定と同定
イオン分析計	DionexICS-1100	サーモフィッシャーサイエントیفイク	ポンプ：ダブルブランチ方式 インジェクター：サンプリング方式(1μL) カラム：陰・陽イオン分析用カラム付け替え方式 検出器：電気伝導度検出器(サブレッサ方式)	2014	応用技術課	960	ポリマーや金属表面の残留汚染物質又はイオン成分の分析
電子線マイクロアナライザ(EPMA)(WDS又はEDS)	JXA-8200	日本電子	電子銃 高輝度 LaB6 及びタングステン の切り替え可 最大試料寸法 100×100×50mm 加圧電圧 0.2~30kV 照射電流範囲 $10^{-12}$ ~ $10^{-5}$ A 二次電子像分解能 5nm(LaB6) 走査倍率 X40~300,000 透過電子検出器 カソードルミネセンスシステム 波長分散法(WDS) 分析元素範囲 ホウ素(B)からウラン(U)まで 分光器数 5チャンネル エネルギー分散法(EDS) 分析元素範囲 ホウ素(B)からウラン(U)まで エネルギー分解能 133eV以下 定性分析、半定量分析、定量分析(ZAF法、検量線法、Bence & Albee法、Phi-Rho-Z法、薄膜定量)、状態分析、線分析、面分析(任意形状マップ、任意曲面マップ)、相分析、薄膜定量分析、波形分離ソフト、電子線侵入領域表示ソフト	2005	応用技術課	5,200	材料の微小部分分析
電子線マイクロアナライザ(EPMA)(WDS及びEDS)						5,810	
電子線マイクロアナライザ(EPMA)(WDSカラーマッピングを含む)						6,520	
電子線マイクロアナライザ(EPMA)(全仕様)						7,240	
FEオージェ電子分光分析装置(全仕様)	PHI-700	アルバック・ファイ	フィールドエミッション(FE)タイプ電子銃 同軸円筒型電子分光器(CMA) 中和機能付 アルゴンイオン銃 アコースティックエンクロージャ	2009	応用技術課	11,220	各種材料の微小部表面分析
FEオージェ電子分光分析装置(イオン銃不使用)						8,160	
X線光電子分光分析装置(イオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	X線源：モノクロメータ(Alアノード)、デュアルアノード(Mg/Al) X線ビーム径：φ10~200μm X線スキャン範囲：□1.4mm×1.4mm 最高エネルギー分解能：半値幅0.57eV(Ag3d) Arイオン銃加速電圧：0.2~5kV Arガスクラスタイオン銃加速電圧：1~20kV 最大試料サイズ：φ60mm(高さ8mm)以下	2014	応用技術課	10,200	固体表面微小(φ200μm範囲)の元素組成及び化学結合状態分析
X線光電子分光分析装置(ガスクラスタイオン銃)						13,260	
グロー放電発光分析装置	GD Profiler 2	堀場製作所	測定元素：ポリクローメーター (H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, In, Sn, W, Au, Pb) モノクロメーター(H~U, 1元素)測定エリア： 4mmφ(標準)、2mmφ、7mmφ 試料サイズ：10mm 深さ分解能：数nm 測定深さ：数nm~100μm(最大)		基盤技術課	7,650	各種材料の元素の深さ方向分析
粒子径分布測定装置	SALD-2300	島津製作所	測定原理：レーザ回折・散乱法 測定範囲：0.017~400μm	2013		560	粉体の粒度分布特性の測定

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## <分析用（その4）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
示差熱・熱重量測定装置	DTG-60H	島津製作所	温度範囲：室温～1500℃ 質量測定範囲：±500mg 示差熱測定範囲：±1000μV 重量読み取り限界：0.001mg 秤量：風袋込み1g	2014	基盤技術課	660	材料の示差熱・熱重量の測定
示差走査熱量計	DSC-60Plus	島津製作所	温度範囲：-140～600℃ 熱流量検出範囲：±150mW			860	材料の示差走査熱量の測定
熱機械分析装置	TMA-60	島津製作所	温度範囲：室温～1000℃(膨張測定時) -150～600℃(冷却用加熱炉使用時) 試料寸法：直径 8×20mm 以下 試料への荷重：0～±5N			1,120	材料の熱機械特性の測定
熱伝導率測定装置	LFA467	ネッチ・ジャパン	温度範囲：室温～500℃ 熱拡散率測定範囲：0.01×1000mm <sup>2</sup> /s 熱伝導率測定装置：<0.1～2000W/(mK) 試料寸法：10×10mm			2,140	材料の熱伝導率の測定
自動ボンベ熱量計	1013-H	吉田製作所	測定範囲：1000～8000cal ボンベ：18-8ステンレス(SUS304)	1989	応用技術課	300	カロリー（熱量）測定

## <表面処理・環境試験用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
蛍光 X 線膜厚計	EA6000VX	日立ハイテックサイエンス	測定元素：Na(原子番号 11)～U(原子番号 92) 線源：Rh ターゲット 管電圧最大 50 kV 管電流最大 1000μA 検出器：マルチカロード Si 半導体検出器 測定領域：0.2、0.5、1.2、3.0mm□ 測定機能：検量線モードによる単層、二層、合金膜厚測定 薄膜 FP モードによる最大 4 層の膜厚測定 定性分析・マッピング測定 試料最大サイズ： 250(幅)×200(奥行)×150(高)mm	2014	応用技術課	2,040	めっき等金属皮膜の厚さ測定
表面物性試験装置	CSR-2000	レスカ	JISR-3255 に準拠したマイクロクラッチ法による測定 印加荷重範囲：1mN から 1N 圧子励振振動数：45Hz 圧子励振幅：5・10・20・40・50・80・100μm 圧子形状：R5・15・25・50・100μm			3,060	薄膜付着強度試験
ポテンショスタット	HZ-5000	北斗電工	・最大出力電圧 ±30V ・最大出力電流 ±1A	2008		250	材料の耐食性評価、 湿式製膜特性評価
塩水噴霧試験機	STP-90V-4	スガ試験機	試験槽内温度：35±2℃ 腐食液：5%食塩水	1989		依頼試験のみ	塩水による錆発生試験
複合サイクル腐食試験機	CYP-90	スガ試験機	塩水噴霧：35～50±1℃ 噴霧液 5%中性塩 乾燥：外気温度+10℃～70±1℃ 湿度 25±5%rh(60℃に於いて) 湿潤：外気温度+10℃～50±1℃ 湿度 60～95±5%rh(50℃に於いて) 外気導入：温湿度制御なし 試験室サイズ：900(幅)×600(奥行)×500(高)mm 試料枚数：48 枚(150×70×1mm) 試料取付角度：垂直に対して 15°または 20°	2013	依頼試験のみ	材料の腐食環境試験	
耐候性評価システム (キセノンランプ)	XER-W75	岩崎電気	光源：キセノンランプ 最大放射照度：48～180W/m <sup>2</sup> 照射時温度：50～95℃ 照射時湿度：40～80%rh 有効照射面積：54 片(70 mm×150 mm)	2014	基盤技術課	1,630	キセノンランプ方式各種材料の促進耐候性評価
耐候性評価システム (メタルハライドランプ)	SUV-W161	岩崎電気	光源：メタルハライドランプ 最大放射照度：1500W/m <sup>2</sup> 照射時温度：50～85℃ 照射時湿度：40～70%rh 有効照射面積：190 mm×422 mm			1,530	メタルハライドランプ方式各種材料の促進耐候性評価
超低温恒温器	MC-811P	イスベック	-85℃～+180℃ 試験室寸法：400×400×400mm 温度上昇時間：+20℃～+180℃まで約 30 分 温度下降時間：+20℃～-80℃まで約 70 分	2011		400	超低温での動作確認、 温度サイクル試験等

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## <表面処理・環境試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
温湿度サイクル試験装置	PSL-2K	エスベック	温度：-70～+100℃ 湿度：20～98%RH 試験室サイズ： 600(幅)×600(奥行)×850(高)mm	2004	応用技術課	710	温度・湿度を固定あるいは可変にしての耐環境試験
冷熱衝撃試験装置	TSA-103ES-W	エスベック	温度範囲： (高) +60～+200℃ (低) -70℃～0℃ 試験室サイズ： 650(幅)×370(奥行)×460(高)mm	2020		2,200	急激な温度上昇・下降環境下での耐環境試験

## <微生物・食品試験用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
テクスチュロメーター	GTX-2-IN	全研	そしゃくスピード：6回/分 及び 12回/分	1979	応用技術課	560	食品の硬さ・もろさ・付着性等の「そしゃく」に準じた物性試験
レオメータ	NRM-2010J-CW	不動工業	測定荷重：0～98N 作動速度：2, 5, 6, 30cm/min			250	食品の圧縮・引っ張り応力緩和・そしゃく試験
凍結乾燥機	FD-1	東京理化工機	トランプ冷却温度：-45℃ 除湿量：4L / 回	1987		200	食品等の凍結乾燥
噴霧乾燥機	SD-1000	東京理化工機	噴霧ノズル：二流体ノズル 水分蒸発量：最大 1500mL/h (試料の種類・乾燥条件により時間当たりの処理量は異なります。) 温度調節範囲：40～200℃	2014		400	飲料、液体調味料、その他液体食品の噴霧乾燥
嫌気性培養装置	EAN-140	タバイエスベック	脱酸素触媒方式	1989		200	嫌気条件下での微生物培養
超音波ホモジナイザー	Q500	Qsonica	最大出力：550W 周波数：20kHz	2015		150	微生物（細菌等）及び組織等の破碎・ホモジナイズ
リアルタイム PCR 装置	Thermal CyclerDice RealTimeSystem 2	タカラバイオ	温度測定範囲：4.0 ～ 99.9℃ 同時測定サンプル数：96 サンプル 検出方法：SYBR Green I 検出及びプローブ検出	2011		560	食品等含まれる特定の DNA の定量分析

# ご利用いただける機器一覧（本所）

## <映像・工芸技術用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
アイマークレコーダー	EMR-V	ナック	視野：水平 30°60° 垂直 22.5°45°	1989	企画 連携課	760	人の目の注視点測定により感情変化等を解析
ホストCGシステム (基本システム)	ONYX	シリコングラフィックス	表示解像度：1280×1024 同時表示可能色：16777216色			4,990	2次元・3次元画像処理によるデザイン開発、シミュレーション、プレゼンテーション、アニメーション映像制作 3Dゲームグラフィックス
ホストCGシステム (全仕様システム) 画像・映像の入出力機器を含む						7,030	2次元・3次元画像処理によるデザイン開発、シミュレーション、プレゼンテーション、アニメーション映像制作 3Dゲームグラフィックス
4Kメモリーカムコーダー	PXW-Z100	ソニー	4K(4096×2160) フレームレート；60P(59.94p) 映像サンプリング処理；4:2:2 ビットレート；10bit 最大 600Mbps 映像記録方式；XQDカードスロット×2 XAVC記録 放送業務用4Kカメラの規格と同じ記録方式に対応。 (32GBのXQDメモリーカード1枚で約6分間録画可能) ※追加記録用XQDメモリーや三脚等は申込者でご準備ください。	2015		100	4K映像の撮影
サンドブラスター	SGK-3型	不二製作所	加工範囲：600×500×600mm	1985		150	金属の表面硬化処理及び木材、金属、ガラス等の彫刻、研磨

## <造形・試作用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
高速三次元成形機 (樹脂粉末積層3Dプリンタ)	RaFaEl 300F	アスペクト	作成方法 粉末焼結法による積層造形 有効造形サイズ 300mm × 300mm × 400mm 実造形サイズ 290mm × 290mm × 370mm 積層ピッチ 0.08mm~0.20mm (標準 0.1mm) レーザー Fiber レーザ 出力 50W、ビーム径 0.17mm 走査速度 10m/sec、ジグザグ走査方式 造形材料 ナイロン 11(ASPEX-FPA 黒)	2013	基盤 技術課	7,030	3次元CADデータからの立体モデルの作成
三次元スキャナ (本体)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	非接触式スキャナ部<光切断方式> 精度：±35µm 繰返し精度：35µm (2σ) スキャンレンジ：80mm~165mm(測定深さ方向) スキャンレート：45,120点/秒 接触式アーム部<7軸関節測定> 定点繰返し精度：29µm 測定精度(二点間距離)：±41µm 測定範囲：2.7m	2014		1,730	3次元データの取得
三次元スキャナ (ソフトウェア)			PolyWoks Inspector Premium (検査) + Modeler Premium (データ編集) Materialise 3-matic STL (データ編集)			910	
3次元CAD/CAE	SolidWorks Simulation	SolidWorks Simulation	SolidWorks (3次元CAD) SolidWorks Simulation (CAE構造解析)	2000		250	3次元CADデータの作成・活用

# ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

## <精密測定検査用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
CNC三次元測定機	Crysta-ApexC9166	ミットヨ	測定範囲：905×1,605×600mm 指示誤差：(1.7+4L/1,000)μm (L：測定長さ) 画像測定用プローブを併用した非接触測定も可能	2007	中丹技術支援室	3,260	複雑形状部品の精密計測
表面粗さ・輪郭形状測定機	SV-C4000CNC	ミットヨ	測定範囲：X 200mm、Y 200mm、Z(表面粗さ)0.8mm、Z(輪郭形状)50mm 分解能：(輪郭形状)0.05μm Y軸テーブルを駆動しての三次元表面粗さ測定も可能			1,930	精密部品等の表面粗さ・輪郭形状の測定
携帯用表面粗さ計	SJ-301/0.75mN	ミットヨ	測定範囲：X軸 12.5mm、Z軸 350μm 測定力：0.75mN	2006		450	精密部品等の表面粗さ測定
レーザ顕微鏡	LEXT OLS3100	オリンパス	高さ測定範囲：10mm 最大試料寸法：150×100×100mm 平面分解能：0.12 μm 高さ分解能：0.01μm			2,140	微小な表面形状等の非接触精密計測・観察
三次元光学プロファイラー	NewView8300	ゼイゴ	垂直走査低コヒーレンス干渉法 垂直分解能 0.1nm 空間分解能 0.52μm	2017		3,770	
真円度・円筒形状測定機	RA-H5100CNC	ミットヨ	回転精度： (0.02+4H/10,000)μm (H：測定高さ) 最大測定径：φ356mm 最大測定高さ：550mm	2007		2,340	精密部品等の真円度・円筒度測定
定盤	グラプレート No.517-409	ミットヨ	寸法：1,000×1,000mm 等級：00級	2006		150	精密測定機器の校正作業、精密部品の測定作業時の基準平面
チェックマスタ	HMC-1000H	ミットヨ	測定範囲：1,000mm			150	精密測定機器の校正
ハイトマスタ	HME-600DM	ミットヨ	測定範囲：10<H≤610mm			150	
ハイトゲージ	HDM-100AHD-30A,HS-30	ミットヨ	最大測定長：1,000mm、300mm			100	精密部品等の高さ測定
マイクロメータ	MDC-25MJ 他	ミットヨ	測定範囲：0～800mm		100	精密部品等の寸法測定	
内測マイクロメータ	HT-12ST 他	ミットヨ	測定範囲：2～1,300mm		100	精密部品等の内径測定	
セラミックブロックセット	BM3-112-K	ミットヨ	組数：112個組 等級：K級		350	精密測定機器の校正	
ゲージブロックセット	No.613802-013 他	ミットヨ	寸法：125、150、175、200、250、300mm 等級：K級		200		
リングゲージ	No.177-146 他	ミットヨ	寸法：φ50、60、70、80、90、100、125、175、200、225、250、275、300mm		150		

## <機械加工用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
旋盤 ※1	LEO-80A	テクノワシノ	ベッド上の振り：490mm 往復台上の振り：260mm センター間距離：800mm	2007	中丹技術支援室	910	機械部品等の切削加工
フライス盤 ※1	KGJP-55	牧野フライス製作所	移動量：X550 Y250 Z350mm 主軸回転数：130～2,200rpm (8段切換)			1,530	機械部品等の切削加工
小型旋盤 ※1	EB-10	エグロ	ベッド上の振り：266mm 切削台上的振り：140mm センター間距離：250mm			300	機械部品等の切削加工
タッピングボール盤 ※1	KRT-340R	キラ・コーポレーション	タッピング能力：M4～M10 (S45C) ドリリング能力：φ3～φ11mm (S45C)	2006		100	穴あけ・ネジ穴あけ
手動折り曲げ機	LD-414	盛光	加工板厚：2.0×1,220mm 口の開き：38mm			100	金属製板材の折り曲げ
鏡面ショット研磨機	SMAP II型	東洋研磨材工業	開口部：260×350mm			560	研磨材による乾式研磨

※1 切削工具(旋削用チップ、エンドミル、ドリル刃、タッパ等)は、機器借受者が持参してください。

# ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

## ＜機械加工用（その2）＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
電気溶接機	デジタル溶接機	松下溶接システム	溶接ヒューム回収装置付	2006	中丹技術支援室	1,530	ステンレス・鋼材の溶接
ベルト研磨機	FS-2N	淀川電機製作所	ベルト寸法：幅 100mm			200	金属等の研削
両頭グラインダ	FG-205T	淀川電機製作所	砥石寸法：205φ×19mm			150	
高速切断機	SK-1	昭和機械工業	砥石：305φmm			100	
帯ノコ盤	VZ-300	ワイエス工機	切断能力：高さ 200mm、奥行き 300mm 鋸刃速度：25～115 m/min			100	

## ＜材料試験用＞

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
万能材料試験機 (250kN)	AG-250kNIS MO	島津製作所	最大荷重：250kN	2007	中丹技術支援室	3,670	材料強度試験（引張・圧縮・曲げ・荷重）
万能材料試験機 (5kN)	AG-5kNIS	島津製作所	最大荷重：5kN			1,020	材料強度試験（引張・圧縮・曲げ・荷重）
ひずみゲージ式センサ・アンプユニット	LU-100KE, LU-1TE, LU-10TE, AS-10HB, AS-100HA, PG-10KU, PG-100KU, DT20D, DPM-712B	共和電業	引張圧縮両用型ロードセル 3種、 高応答小型加速度変換器 2種、 圧力変換器 2種、 変位変換器、 動ひずみ測定器	2006		200	ひずみゲージ式センサーにより荷重・圧力・変位の物理量を測定
ロックウェル硬さ試験機	ARK-600	ミツトヨ	デジタル表示、自動(負荷、保持、除荷)			400	ロックウェル硬さの測定
マイクロピッカース硬さ試験機	FM-700	フューチュアテック	試験荷重：0.049(5gf)～19.6N(2000gf)までの11段階 モニター表示による自動測定 曲面自動補正機能付き			450	金属の微小部硬さの測定
簡易携帯硬さ試験機	エコーチップ硬さ試験機	プロセク	HL、HV、HB、HS、HRC、HRB、HRA		200	各種材料等の各種硬度測定	
反発式ポータブル硬さ試験機	HARDMATICHH-411	ミツトヨ	最小試験面：22mmφ、 硬さHL値を基にピッカース、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB等への換算可能		100	金属用硬度計	
マイクロフォーカスX線透視装置	SMX3000micro	島津製作所	搭載可能サイズ：φ300、高さ650mm 搭載可能サンプル質量：20kg以下 X線出力：130kV	2007	3,870	アルミダイカストなどの内部欠陥の観察・検査	
真空定温乾燥器	DP43	ヤマト科学	温度：(室温+10℃)～200℃ 到達真空度：6.7×10 <sup>-1</sup> Torr以下 器内寸法：450×450×450 <sup>mm</sup>	2006	350	各種材料の真空定温乾燥	
電気マッフル炉 ※2	FUM332PA	アドバンテック東洋	使用温度範囲：400～1,300℃（常用最高温度1,200℃） 温度分布精度：±5℃(1,100℃) 昇華時間：約30分(常温→1,100℃)		150	金属の焼き入れ・焼きなまし・焼成の他灰分試験・熔融点の測定	
赤外線サーモグラフィ (R500EX-Pro)	R500EX-Pro	日本アビオニクス	測定範囲 -40～2000℃ 温度精度 ±1℃(20～30℃) 画素数 1280×960画素(超解像モード) 640×480画素(通常モード) 2倍望遠レンズ付き、PCリアルタイム転送(30Hz)	2017	560	物体の表面温度分布状況の測定	
FFTアナライザー	EDX-2000A	共和電業	最高サンプリング周波数：200kHz（16CH同時サンプリング時） 周波数応答解析、トラッキング解析	2006	400	各種装置の機械振動・回転振動等の測定・周波数解析	
振動計 ※3	VM-82（ピックアップ：PV-57A）	リオン	測定範囲 加速度：0.002～20G（1Hz～5kHz） 速度：0.3～1,000mm/s（3Hz～1kHz） 変位：0.02～100mm（3～500Hz）		100	機械の振動状態の測定	
機械振動周波数分析システム	EDX-200A-1	共和電業	測定チャンネル数：最大8ch サンプリング周波数：1Hz～100kHz 本体外形寸法：148(W)×53(H)×257(D)mm 本体質量：約0.9kg	2014	300	金属材料の振動周波数特性等の解析	

※2 使用するガス等は、機器借受者が持参してください。

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

# ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

## <電気試験用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
シンクロスコープ (DL9040)	DL9040	横河電機	周波数帯域：500MHz 最高サンプルレート：5G/s メモリ長：2.5MW 入力数：4ch	2006	中丹技術支援室	200	電気信号の波形観測・記録
データレコーダー	LX-10	ティアック	記録可能周波数：DC～40 kHz 入力：8ch、出力：8ch			200	電気信号の記録およびその再生
PIC マイコンデバッグ	MPLABICD2	マイクロチップ	フラッシュ型 PIC 用			100	PIC マイコンのデバッグ及びプログラムライター
ファンクションジェネレータ	SG-4105	岩通計測	出力可能波形・周波数 正弦波、方形波：10MHz～15MHz 三角波、パルス波、ランプ波：10MHz～100kHz			100	さまざまな周波数と波形をもった電気信号の生成
ユニバーサルカウンタ	SC-7206	岩通計測	測定周波数範囲：10MHz～2GHz(カップリング AC)			100	電気信号の周波数測定
直流安定化電源装置	PAN35-5A	菊水電子工業	出力電圧：0～35V 出力電流：0～5A			100	定電圧・定電流の直流電源装置
EMC 測定システム	GTEM750	シャフナー	供試体最大サイズ：62cm×62cm×49cm 放射エミッション測定：30MHz～3GHz 放射イミュニティ試験：80MHz～1GHz 伝導イミュニティ試験：150kHz～80MHz 雑音端子電圧測定：150kHz～30MHz 静電気試験	2007		3,570	GTEM セルを用いたエミッション測定・イミュニティ試験
インピーダンス・ゲインフェーズアナライザシステム	E4990A	キーサイト・テクノロジー	測定周波数範囲：20 Hz～120 MHz	2017		1,830	電子部品等のインピーダンス評価、誘電率・透磁率の材料定数測定
	ZGA5920	N F 回路設計ブロック				910	低周波帯における電子部品等のインピーダンス評価、ゲイン・フェーズ測定

## <顕微鏡及び試料作製装置（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
コンタミネーション解析システム	RH-2000-PC	ハイロックス	レンズ倍率：35～2,500倍 コンタミネーション解析機能 (ISO16232、NAS1638 及び VDA2015 に準拠した洗浄度評価) ろ過装置付き 自動テーブル(50mm×50mm) 2D 及び 3D において寸法計測及び粗さ解析	2017	中丹技術支援室	1,420	油分中に含まれる異物の大きさ・カウント
走査電子顕微鏡 (観察のみ)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	分解能 [高真空モード]1.5nm(30kV) [低真空モード]1.8nm (15kV) 倍率 5～600,000倍 元素分析(EDS) Be～U 定性・定量分析 元素マッピング機能付き 試料ステージ X:125,Y:100,Z:80mm 傾斜 -10～90度 回転 360度			3,460	各種試料の表面観察
走査電子顕微鏡 (観察+元素分析)						5,300	各種試料の表面観察及び元素分析
走査電子顕微鏡 (観察+結晶方位分析)						6,120	各種試料の表面観察及び結晶方位分析
走査電子顕微鏡 (観察+元素分析+結晶方位分析)						7,850	各種試料の表面観察、元素分析及び結晶方位分析
デジタルマイクロスコープ	KH7700	ハイロックス	倍率：6～3,500倍 斜視観察：25・35・45・55度	2007		810	工業部品・材料の拡大観察・解析
金属顕微鏡	TME200BD	ニコン	倍率：50、100、200、500、1000 明視野、暗視野	2006		250	金属組織の観察
実体顕微鏡	SMZ1000	ニコン	総合倍率：4～40倍		100	部品等の拡大観察	

## ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

### <顕微鏡及び試料作製装置（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
クロスセクションポリッシャ	IB-19530CP	日本電子	イオン加速電圧 2~8kV ミリングスピード 500μm/h 自動スイング機能 ±30° 最大試料サイズ： 11mm(幅)×10mm(長さ)×2mm(厚さ) CCDカメラによる試料位置合わせ	2017	中丹技術支援室	810	イオンビームを用いた試料面の作製
金相試料作製装置	ラボプレス 1,テグラポール21,テグラフォース 3,テグラドーザ 1,ディスコム 6	丸本ストラス	精密試料切断機、試料埋込機、半自動研磨機	2006		6,220	金相試料の作製
クライオミル	CryoMill	ヴァーダー・サイエンティフィック	粉碎方法：衝撃力、摩擦力 試料投入サイズ：8mm 以下 投入試料量：最大 20ml 粉碎時間(通常)：10分/4分(冷却/粉碎) 粉碎モード：乾式、湿式、凍結 粉碎セット材質：ステンレス鋼	2020		450	試料の粉碎

### <分析用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
蛍光X線分析装置 (EDX-7000)	EDX-7000	島津製作所	検出元素 Na~U X線照射径 0.3, 1, 3, 5, 10mm 下方照射 CCDカメラによる試料画像観察機能有 液体(大気環境のみ)及び粉体用容器付き	2017	中丹技術支援室	1,730	各種材料に含まれる元素分析(定性・定量)
スパーク放電発光分析装置	PDA-7000	島津製作所	検出元素及び測定範囲 C (0.003 ~ 4.0%), S i (0.002 ~ 4.0%), S (0.001 ~ 0.1%), P (0.001 ~ 0.5%), M n (0.002 ~ 2.0%) 他 ※括弧内は含有率 測定サイズ φ12mm~			2,750	鉄、鉄鋼材料中の元素分析(定性・定量)
X線回折装置Ⅱ	XRD-6100	島津製作所	最大測定角範囲：-3~150° (2θ) 最小送り幅：0.002° (θ, 2θ) 繊維選択配向測定可能 カウンターモノクロメーター装備	2007		1,630	各種工業材料の結晶構造の解析
フーリエ変換赤外分光光度計 (赤外顕微鏡付)	IRPrestige-21A IM-8800	島津製作所	ビームスプリッター：Ge 蒸着膜 KBr 検出器：DLATGS 検出器 波数範囲：7800~350 分解能：0.5cm <sup>-1</sup> オートアパーチャなど		2,650	主に有機物の同定と定量	
紫外・可視分光光度計	V-630	日本分光	ダブルビーム方式 波長範囲：190~1100nm スペクトルバンド幅：1.5nm 測定モード：Abs、%T	2006	150	各種材料の紫外・可視スペクトル測定	
分光色差計	NF-333	日本電色工業	分光反射測定範囲：400~700nm 表色系：L*A*B*系他		100	各種材料の表面色の測定	
分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	光源：150Wキセノンランプ 測定波長範囲：200~750nm 及び 0 次光 感度：S/N800 以上(RMS) S/N250 以上(Peak to Peak) 試料形態：液体・粉体・フィルム等 3次元測定・時間変化測定が可能	2007	610	蛍光・りん光の測定によるスペクトル分析・定量分析	

# ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

## <分析用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
ガスクロマトグラフ質量分析装置（オプションなし）	GCMS-QP2020 NX EGA/PY-3030D HS-20Trap	島津製作所	GC-MS イオン化方式：E I 質量範囲：m/z1.5~1,090 最大スキャン速度：20,000u/秒 液体オートサンブラー最大試料数：150 パイロライザー 温度制御範囲：室温+10~1050℃ 温度安定性：±0.1℃以内 インターフェイス温度：40~450℃ オートサンブラー最大試料数：48 ヘッドスペースサンブラー 試料導入方式：サンプルループ及びトラップ 最大試料数：90 バイアルサイズ：20mL、10mL 攪拌：5段階 保温温度：室温+10~300℃ トラップ冷却温度：-30~80℃ トラップ加熱温度：0~350℃ ダイレクトインジェクション 温度設定範囲：室温~500℃"	2020	中丹技術支援室	4,300	有機化合物の定性及び定量分析
ガスクロマトグラフ質量分析装置（パイロライザー）			6,000				
ガスクロマトグラフ質量分析装置（ヘッドスペースサンブラー）			5,200				
ガスクロマトグラフ質量分析装置（ダイレクトインジェクション）			4,400				
液体クロマトグラフ	Prominence	島津製作所	高圧、グラジエントタイプ 検出器：紫外可視、蛍光検出器	2006	中丹技術支援室	910	有機化合物の定性及び定量分析
アミノ酸分析装置	L-8900	日立ハイテクノロジーズ	カラム：陽イオン交換カラム 反応試薬：ニンヒドリン 検出波長：570nm, 440nm	2007		2,850	アミノ酸の分析
示差走査熱量測定装置	DSC-60A	島津製作所	測定温度：温度プログラム可能 液体窒素非使用時：25~600℃ 液体窒素使用時：-130~500℃	2006	中丹技術支援室	760	材料のDSC測定
細管式レオメータ	CFT-500D	島津製作所	分銅による定試験力押し出し式 試験圧力：0.4903~49.03MPa 試験温度：(室温+20)~400℃			810	樹脂等材料の流動性評価
レーザー回折式粒度分布測定装置	SALD-2200	島津製作所	レーザー回折散乱法 測定範囲：0.03~1000μm 有機溶媒使用可能			860	粉体の粒度測定
微量水分計	CA-21	ダイアインストルメンツ	カールフィッシャー電量滴定法			610	溶液中の水分濃度測定
脈波計	APG-1000	ACIMedical	バイアス圧：6mmHg(1~5mmHg可変) センシングカフ：27.5cm、30cm、20cm（前腕用）			610	静脈流の定量的評価
有機合成用ドラフトチャンバー	RFG-150SZ	ヤマト科学	有機合成用ドラフトチャンバー			910	有機溶剤使用作業時の保護

## <表面処理・環境試験用（その1）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
接触角測定装置	FTA-125	FTA	測定範囲：0~180° 分解能：0.1° 画面取り込みレート：60fps	2006	中丹技術支援室	560	材料のぬれ性評価
蛍光X線膜厚計	SFT9400	エスアイアイ・ナノテクノロジー	測定元素：Ti~Bi X線管：電圧50kV 電流1.5mA 測定ソフト：薄膜FP法、検量線法	2007		2,140	金属薄膜の膜厚測定
電磁・渦電流膜厚計※3	LZ-200J	ケット科学研究所	測定範囲：0~1500μm(電磁) 0~800μm(渦電流) 最小測定面積：3×3mm			200	アルマイト・塗装皮膜等の膜厚測定

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

# ご利用いただける機器一覧（中丹技術支援室／綾部市）

## <表面処理・環境試験用（その2）>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
温湿度サイクル試験装置 (800L)	PL-4K/P 計装	エスベック	温度：-40～+100℃ 湿度：20～98%RH 試験室の大きさ： 1,000 (幅) × 800 (奥行) × 1,000 (高) mm	2006	中丹技術支援室	960	温度・湿度を固定あるいは可変しての耐環境試験
小型高温チャンバー	ST-120B1	エスベック	温度：(外囲温度+20℃)～+200℃ 試験室寸法：400×350×280 <sup>H</sup> mm			100	高温環境下での耐環境試験
振動試験機 (16kN)	F-16000BDH/L A16AW	エミック	方式：電動式 最大加振力： 16.0kN(正弦波) 12.8kN r m s (ランダム波) 40.0kN(ショック波) 最大変位：56mm p-p 最大速度：2.3m/sec 振動数範囲：3～2,000Hz(加振テーブルの種類、積載重量等により変動し、振動範囲は狭くなります) 加振テーブル： 水平加振台(800×800mm、最大 3～1,700Hz) 垂直補助テーブル(800×800mm、最大 3～300Hz) 垂直補助テーブル(500×500mm、最大 3～550Hz) 電子部品用高周波治具(150×150×150mm、最大 3～2,000Hz)			2,650	振動試験
騒音計 ※3	NL-22	リオン	測定周波数範囲：20～8,000Hz 測定レベル範囲 (A 特性)：28～130dB 1/1・1/3 実時間オクターブ分析			100	環境騒音・機械騒音の測定
振動レベル計 ※3	VM-53A (ピックアップ：PV-83C)	リオン	測定周波数範囲 振動レベル：1～80Hz 振動加速度レベル：1～80Hz 振動レベル範囲：25～120dB(Lv-Z)			100	地盤振動の測定 (人体の振動感覚特性で補正した振動レベルの計測)

※3 乾電池等消耗品は、機器借受者が持参してください。

## <映像・工芸技術用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
ストロボスコープ	MS-600	菅原研究所	発光周波数範囲 30～60000r/min	2006	中丹技術支援室	100	点滅発光による動作確認
デジタルハイスピードカメラ	MEMORECAMfx K4	ナック	撮像素子画素数 1280×1024 1000コマ/秒 ISO 2400 (カラー)			1,420	高速撮影映像による挙動解析

## <造形・試作用>

※貸付料基本額は1時間あたりの料金です。

機器名	商品名	メーカー名	仕様	設置年度	担当	貸付料基本額(円)	用途
非接触3次元デジタルサイザ	VIVID9i	コニカミルタセンシング	測定範囲(最大) 1495×1121×1750mm 出力画素数 640×480	2006	中丹技術支援室	1,630	非接触型の3次元測定
3Dプリンター(ラピッドプロトタイプ)	dimension Elite	Stratasys	造形サイズ(最大)：W203×D203×H305 積層ピッチ：0.178mm	2007		3,060	3次元CADデータからの立体モデルの作成
高速開発支援センター(VDIシミュレーションシステム)	Mechanical EnterpriseCFD EnterpriseHFSS Maxwell 3D ADINA ソリッドワークス	ANSYS 他	構造解析・熱・振動 熱流体・乱流・回転機械 高周波電磁界解析 電磁界解析 各種連成解析	2017		2,550	各種シミュレーション及びモデリングソフト
高速開発支援センター(3次元スキャナー)	ATOS core45, 200, 500	Gom	測定範囲：45×30mm, 200×150mm, 500×380mm 出力画素数：2560×1920 リバース用ソフト：Geomagics Design X 検査用ソフト：Gom Inspect Pro 動的評価：7Hz			2,550	非接触型による測定 (リバースエンジニアリング・CAT)
高速開発支援センター(高精度3Dプリンター)	AGILISTA-3200	キーエンス	造形サイズ(最大)： 297×210×200mm 積層ピッチ：0.015mm 材質：硬質樹脂(アクリル系樹脂)			2,550	3次元CADデータからの立体モデルの作成

# 館内案内

※ 京都府中小企業技術センターの受付(事務室)は3階にございます。

## 5F 京都府中小企業技術センター

1	交流サロン	5	セラミックス研究室
2	第4会議室	6	工業材料研究室
3	第1研修室	7	資料室
4	第2研修室		

## 4F 京都府中小企業技術センター

1	電子・情報技術研究室	5	電子研究室
2	生産環境研究室	6	環境試験室
3	食品・バイオ研究室	7	表面処理研究室
4	デザイン研究室		

## 3F 京都府中小企業技術センター

1	事務室（総務課・企画連携課 基盤技術課・応用技術課）	4	電子顕微鏡室
2	化学分析室	5	X線分析室
3	機器分析室	6	工芸技術開発室
		7	技術センター 所長室

## 2F (公財)京都産業21、(一社)京都発明協会 ほか

1	(一社)京都発明協会	3	(一社)京都スマートシティ推進協議会
2	(公財)京都産業21	4	京都産業21 専務理事室

## 1F 京都府中小企業技術センター、(公財)京都産業21

1	総合受付・お客様相談室	8	企業連携技術開発室
2	第1会議室	9	電子技術開発室(電波暗室)
3	(公財)京都産業21	10	金属加工技術開発室
4	特別参与室・理事長室	11	機械加工技術開発室
5	食品・微生物技術開発室	12	非破壊検査室
6	生産環境技術開発室	13	材料試験室
7	表面加工技術開発室	14	電子・材料試験室

## B1F 京都府中小企業技術センター

1	試料作成室	4	材料物性研究室
2	光技術開発室	5	精密測定室
3	電磁波シールドルーム	6	機械加工研究室

## 治 革

昭和21年4月	下京区西七条名倉町に京都府立機械工業指導所が開設され、旧京都府立機械工養成所の全職員と全施設がこれに引き継がれた。
昭和25年8月	京都府立産業能率研究所の設立
昭和37年8月	産業能率研究所と機械工業指導所を統合し、京都府立中小企業指導所を設置（それぞれ経営指導部、技術指導部となる）
昭和41年6月	名称を京都府立中小企業総合指導所に変更
平成元年10月	京都リサーチパーク内に移転。名称を京都府中小企業総合センターに変更
平成13年4月	組織変更（経営・技術各部門を機能別に再編、けいはんな分室設置）
平成17年4月	組織変更（経営部門を(財)京都産業21に移管し、名称を京都府中小企業技術センターに変更）
平成19年4月	組織変更（北部産業技術支援センター・綾部に中丹技術支援室を設置）
平成20年4月	組織変更（部制を廃止し、4課2室に変更）
平成24年8月	京都府中小企業技術センター創立50周年記念事業開催
平成27年4月	けいはんな分室を「けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）」に移転
平成30年4月	中丹技術支援室を「北部産業創造センター」に移転

### 当センター名のロゴタイプについて

「信頼感」や「力強さ」を感じさせるゴシック体を基本にしつつ、柔らかくアレンジすることで「柔軟かつ効果的なサービスの提供」を、さらに「京」の一部を特徴的に丸くすることでリズム感を出し、「迅速な対応」を表現するとともに「お客様へのほほえみ」をあらわしています。

**令和5年度 事業概要報告書**

令和6年7月

京都府中小企業技術センター

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134  
(七本松通五条下ル)

TEL 075-315-2811

FAX 075-315-9497

# 京都府産業支援センター ご案内

URL : <http://kyoto-isc.jp/> ◇総合相談窓口◇ TEL : 075-315-8660

## ■ 技術のことなら URL : <https://www.kptc.jp/>

### 京都府中小企業技術センター

#### <本所>

〒600-8813  
京都市下京区中堂寺南町 134  
(七本松通五条下ル 京都リサーチパーク内)

#### ◇ 総務課

TEL:075-315-2811 FAX:075-315-9497

#### ◇ 企画連携課

TEL:075-315-8635 FAX: //

#### ◇ 基盤技術課

TEL:075-315-8633 FAX: //

#### ◇ 応用技術課

TEL:075-315-8634 FAX: //

#### <中丹技術支援室>

〒623-0011  
京都府綾部市青野町西馬場下 33-1  
北部産業創造センター内  
TEL:0773-43-4340 FAX:0773-43-4341

#### <けいはんな分室>

〒619-0294  
関西文化学術研究都市(京都府精華・西木津地区)  
木津川市木津川台 9 丁目 6/相楽郡精華町精華台 7 丁目 5  
けいはんなオープンイノベーションセンター (KICK) 内  
TEL:0774-95-5050 FAX:0774-66-7546

## ■ 経営・創業・マーケティングのことなら URL : <https://www.ki21.jp/>

### 公益財団法人 京都産業21

TEL : 075-315-9234

## ■ 知的財産のことなら URL : <http://kyoto-hatsumei.com/>

### 京都府知的財産総合サポートセンター

TEL : 075-315-8686

## ACCESS

#### ◆ JRをご利用の場合

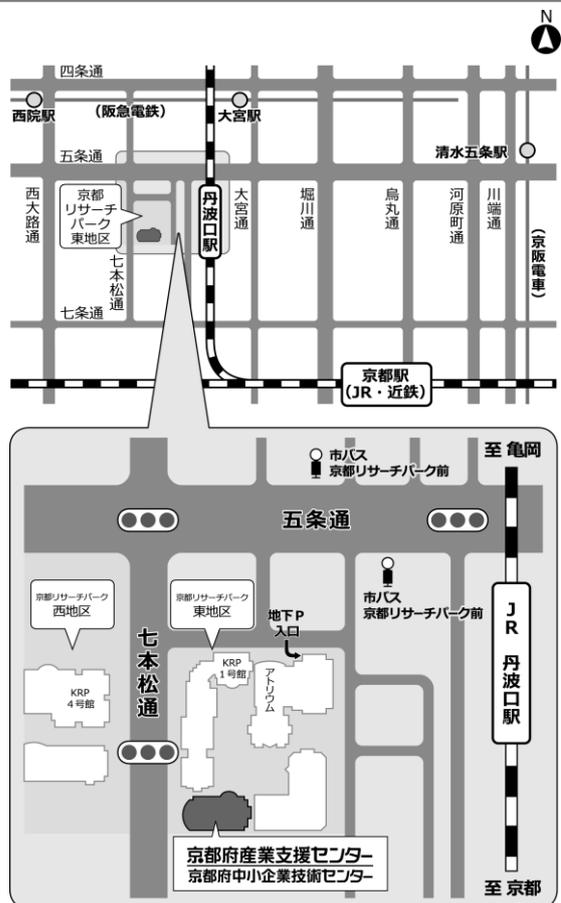
- 丹波口駅から西へ徒歩 5 分

#### ◆ 市バスをご利用の場合

- 阪急大宮駅から 32 系統「京都外大前」行き
- 阪急西院駅から 75 系統「京都駅」行き
- 京阪清水五条駅から  
80 系統「西京極・太秦天神川駅」行き  
(河原町五条バス停 乗車)  
上記の市バスで「京都リサーチパーク前」下車  
七本松通を南へ 200m 東側

#### ◆ 地下駐車場

- 入庫後 15 分無料
- 昼間(08:00~20:00) 100 円/15 分
- 夜間(20:00~08:00) 100 円/60 分
- 平日 当日最大 1,800 円
- 土日祝 当日最大 1,300 円





京都府中小企業技術センター